



試験計測等料金表

令和6年度

[令和6年4月1日 改定]

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

海老名本部
海老名市下今泉705-1
046 (236) 1500 (代表)

溝の口支所
川崎市高津区坂戸3-2-1
かながわサイエンスパーク (KSP) 内
044-819-2030 (支所代表)

目 次

海老名本部

1 試験計測料金

(1) 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析

| | |
|-----------------|---|
| ① 観察 | 1 |
| ② 定量分析 | 2 |
| ③ ガスクロマトグラフ成分分析 | 2 |
| ④ 液体クロマトグラフ成分分析 | 3 |
| ⑤ 固体・表面分析 | 3 |
| ⑥ 分光分析・有機物定性分析 | 4 |
| ⑦ 試料調製 | 4 |
| ⑧ 分光光度計 | 5 |
| ⑨ X線構造解析 | 5 |
| ⑩ 熱物性 | 5 |
| ⑪ 粉体・表面性能 | 6 |
| ⑫ 超臨界試験 | 6 |

(2) 工業材料や部品の強さ、硬さ、耐久性等の評価

| | |
|------------------|----|
| ① 金属・セラミックス・機械部品 | 7 |
| ② 木材 | 8 |
| ③ 糸・繊維 | 8 |
| ④ 塗膜・めっき・表面処理等 | 9 |
| ⑤ プラスチック・ゴム物性試験 | 9 |
| ⑥ 環境試験 | 10 |
| ⑦ 電気化学試験 | 11 |
| ⑧ 燃料電池・二次電池 | 11 |

(3) 機械機器、電気・電子部品等の性能の評価

| | |
|-------------|----|
| ① 電気・機械機器 | 13 |
| ② デバイス・実装 | 13 |
| ③ 電磁環境・EMC | 14 |
| ④ 温湿度・環境 | 16 |
| ⑤ 音響・振動 | 17 |
| ⑥ デザイン・造形 | 17 |
| ⑦ 寸法測定・形状測定 | 17 |
| ⑧ 非破壊検査 | 18 |
| ⑨ 観察 | 18 |

(4) 微生物・生化学・食品

| | |
|--------------|----|
| ① 微生物・生化学・食品 | 19 |
|--------------|----|

(5) その他（成績書の複本・データ等の交付、研究生の指導）

① 成績書の複本・データ等の交付、研究生の指導 19

2 機器使用料金

(1) 生産・加工機器

① 加工機器 20
② 工作機器 20
③ 熱処理 20
④ 電子・半導体(加工) 20

(2) 環境試験・電磁環境試験機器

① 人工気象室 21
② 電磁環境試験機器 21
③ 騒音・振動 21

(3) 試料調製用機器

① 遠心分離機 21
② 熱処理 21
③ 塗装 21
④ バイオ 21

(4) 試験・計測機器

① 形状測定 22
② 厚さ・膜厚 22
③ 強度試験機 22
④ 物理特性試験機 22
⑤ 電気計測機器 22

(5) 分析・評価機器(観察)

① 光学顕微鏡 23
② 内部観察機器 23

(6) 分析・評価機器（物性〔光、熱、音振、エネルギー〕）

① 分光分析 23
② 熱分析 23
③ 反応熱量計 23

(7) その他（製品開発室・ファブラボ）

① 製品開発室 24
② ファブラボ 24

溝の口支所

1 試験計測料金

(1) 材料解析分野

① 機器分析

| | |
|---|----|
| 走査型X線光電子分光分析装置 (μ -XPS・ μ -ESCA) | 25 |
| フーリエ変換赤外分光光度計 <FT-IR> | 25 |
| 微小蛍光X線分析装置 (XRF) | 25 |
| 金属顕微鏡 | 25 |
| デジタルマイクロスコープ | 26 |
| マイクロフォーカスX線検査装置 (μ F-X線) | 26 |
| 硬さ試験機 | 26 |

| | |
|-----------|----|
| ② 温湿度環境試験 | 26 |
|-----------|----|

| | |
|----------|----|
| ③ 電気計測試験 | 26 |
|----------|----|

(2) 微細構造解析分野

| | |
|-------------------------------|----|
| 電界放出型走査電子顕微鏡 (FE-SEM / EDS) | 27 |
| 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM / EDS) | 27 |
| 電界放出型分析透過電子顕微鏡 (FE-TEM / EDS) | 28 |
| 分析透過電子顕微鏡 (FE-TEM / EDS) | 29 |
| TEM試料調製 | 29 |
| 集束イオンビーム装置 (FIB) | 30 |
| マルチ解析用集束イオンビーム装置 (FIB) | 31 |
| 画像解析システム | 31 |

(3) 光機能分野

① 光触媒評価

| | |
|-------------|----|
| 光触媒JIS試験 | 32 |
| 光触媒性能応用評価試験 | 32 |

| | |
|----------|----|
| ② 太陽電池評価 | 32 |
|----------|----|

| | |
|----------|----|
| ③ 光学特性評価 | 33 |
|----------|----|

| | |
|-----------|----|
| ④ 光劣化促進試験 | 33 |
|-----------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| (4) 試料前処理 (前項までの試験の各項目に適用) | 34 |
|----------------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| (5) 成績書の複本の交付 | 35 |
|---------------|----|

| | |
|------------------|----|
| (6) 技術開発受託報告書の作成 | 35 |
|------------------|----|

2 機器使用料金

| | |
|--------------------------------|----|
| (1) 生産・加工機器 | |
| ① 微細加工機器 | 36 |
| (2) 環境試験・電磁環境試験機器 | |
| ① 温湿度環境試験 | 36 |
| ② 電磁環境試験機器 | 36 |
| (3) 試験・計測機器 | |
| ① 形状測定 | 37 |
| ② 物理特性試験機 | 37 |
| ③ 電気計測機器 | 37 |
| (4) 分析・評価機器(観察) | |
| ① マイクロスコープ | 38 |
| ② 光学顕微鏡 | 38 |
| ③ 電子顕微鏡 | 38 |
| ④ 内部観察機器 | 38 |
| (5) 分析・評価機器(組成分析) | |
| ① 元素分析 | 38 |
| ② 組成分析 | 38 |
| (6) 分析・評価機器 (物性〔光、熱、音振、エネルギー〕) | |
| ① 光学機器・分光分析 | 38 |
| (7) 機器操作指導料 | 38 |

[利用上の注意]

- 1 料金は全て消費税を含んでいます。
- 2 この料金表に掲げる以外に実施可能な項目及び使用可能な設備機器もあります。
詳細は担当各部へお問い合わせください。
- 3 機器の更新等により項目及び設備機器名並びに料金の額を変更する場合があります。
- 4 担当部名欄のE及びKの表示は、同一試験項目の各拠点の該当する料金番号を示しています。 E 海老名本部、K 溝の口支所

1 試験計測料金

(1) 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析

① 観察

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|-----------------------------------|---------|-------------------|
| E0011 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍以下 | 1試料1視野観察につき | 21,120 | 機械・材料技術部 K1310 |
| E0012 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍以下 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 4,840 | 機械・材料技術部 K1315 |
| E0013 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍を超えて10万倍以下 | 1試料1視野観察につき | 30,910 | 機械・材料技術部 K1320 |
| E0014 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍を超えて10万倍以下 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 9,240 | 機械・材料技術部 K1325 |
| E0015 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10万倍を超えるもの | 1試料1視野観察につき | 52,250 | 機械・材料技術部 K1330 |
| E0016 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10万倍を超えるもの 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 14,960 | 機械・材料技術部 K1335 |
| E0017 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10～15視野 | | 115,940 | 機械・材料技術部 K1392 |
| E0018 | 走査電子顕微鏡写真撮影 16～30視野 | | 173,910 | 機械・材料技術部 K1395 |
| E0021 | エネルギー分散型X線分析(EDX) (E0011～E0018、E1790に適用) | 1ヶ所につき | 7,150 | 機械・材料技術部 |
| E0022 | イオンリング法による試料調製(1) (標準的なもの) | 1試料1ヶ所につき | 45,100 | 機械・材料技術部 |
| E0023 | イオンリング法による試料調製(2) (複雑なもの) | 1試料1ヶ所につき | 67,430 | 機械・材料技術部 |
| E1790 | 電子線後方散乱回折(EBSD)法による結晶方位測定 | 1視野測定につき | 49,500 | 機械・材料技術部 |
| E1791 | 電子線後方散乱回折(EBSD)法による結晶方位測定 1視野追加 | 1視野追加測定につき | 12,760 | 機械・材料技術部 |
| E0031 | 金属組織写真撮影 | 写真1枚につき | 11,110 | 機械・材料技術部 K5110 |
| E0070 | 写真撮影箇所増し (E0031に適用) | 同一試料で1ヶ所増すごとに | 2,860 | 機械・材料技術部 K5114 |
| E0055 | 実体顕微鏡写真撮影 | 写真1枚につき | 4,840 | 機械・材料技術部 |
| E0056 | 実体顕微鏡写真撮影箇所増し (E0055に適用) | 同一試料で1ヶ所増すごとに | 2,090 | 機械・材料技術部 |
| E0080 | 顕微鏡試料調整(1) (容易なもの) | 1試料につき | 1,980 | 機械・材料技術部 K5120 |
| E0090 | 顕微鏡試料調整(2) (標準的なもの) | 1試料につき | 3,960 | 機械・材料技術部 K5121 |
| E0091 | 顕微鏡試料調整(3) (比較的複雑なもの) | 1試料につき | 7,810 | 機械・材料技術部 K5122 |
| E0092 | 顕微鏡試料調整(4) (非常に複雑なもの) | 1試料につき | 11,550 | 機械・材料技術部 K5123 |
| E0101 | デジタルマイクロスコープ観察 | 1試料につき | 2,640 | 機械・材料技術部 |
| E0102 | デジタルマイクロスコープ撮影 | 1撮影につき | 1,100 | 機械・材料技術部 |
| E2580 | 表面観察(FE-EPMAによる) | 1ヶ所につき | 20,350 | 機械・材料技術部 |
| E2581 | エネルギー分散型X線分析(EDX) (FE-EPMAによる) | 1ヶ所につき (E2570,E2580に適用) | 7,260 | 機械・材料技術部 |
| E2582 | 表面観察(FE-EPMAによる) 1ヶ所増 | 同一試料で1ヶ所増すごとに (E2570,E2580に適用) | 4,510 | 機械・材料技術部 |
| E2590 | 電子線マイクロアナライザ観測(FE-EPMA) 追加分析 | 1ヶ所につき (E2570,E2580に適用) | 9,130 | 機械・材料技術部 |

② 定量分析

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|---------------------------------|--------------------|--------|-------|
| E1810 | 定量分析(A) (容易なもの) | 1試料, 1成分につき(容易なもの) | 10,450 | 化学技術部 |
| E1820 | 定量分析(B) (複雑なもの) | 1試料, 1成分につき(複雑なもの) | 12,650 | 化学技術部 |
| E1821 | 炭素・硫黄分析装置による定量分析(A) (容易なもの) | 1試料, 1成分につき(容易なもの) | 9,130 | 化学技術部 |
| E1822 | 炭素・硫黄分析装置による定量分析(B) (複雑なもの) | 1試料, 1成分につき(複雑なもの) | 13,530 | 化学技術部 |
| E1831 | 原子吸光分析法による定量分析(A) (容易なもの) | 1試料, 1成分につき(容易なもの) | 9,240 | 化学技術部 |
| E1832 | 原子吸光分析法による定量分析(B) (複雑なもの) | 1試料, 1成分につき(複雑なもの) | 13,970 | 化学技術部 |
| E1891 | ICP発光分光分析法による定量分析(A) (容易なもの) | 1試料, 1成分につき(容易なもの) | 9,130 | 化学技術部 |
| E1892 | ICP発光分光分析法による定量分析(B) (複雑なもの) | 1試料, 1成分につき(複雑なもの) | 13,640 | 化学技術部 |
| E1911 | ICP発光分光分析法による定性分析 | 1試料につき, 基本10元素まで | 20,790 | 化学技術部 |
| E1921 | ICP発光分光分析法による定性分析 1元素増 | 1試料につき, 1元素増すごとに | 1,980 | 化学技術部 |
| E1930 | カールフィッシャー水分測定(直接法) | 1条件, 1試料につき | 12,320 | 化学技術部 |
| E1931 | カールフィッシャー水分測定(直接法) 1試料増 | 1試料増すごとに | 7,040 | 化学技術部 |
| E1932 | カールフィッシャー水分測定(加熱気化法) | 1条件, 1試料につき | 15,070 | 化学技術部 |
| E1933 | カールフィッシャー水分測定(加熱気化法) 1試料増 | 1試料増すごとに | 10,340 | 化学技術部 |
| E2110 | 分光蛍光光度計試験 | 1スペクトルにつき | 9,680 | 化学技術部 |
| E2610 | CHN元素分析装置による定量分析 | 1試料につき | 18,700 | 化学技術部 |
| E4010 | 水質試験(A) (容易なもの) | 1項目につき (容易なもの) | 6,710 | 化学技術部 |
| E4020 | 水質試験(B) (複雑なもの) | 1項目につき (複雑なもの) | 10,560 | 化学技術部 |
| E4030 | 溶出検液作成(A) (6成分以下) | 1試料につき (6成分以下) | 4,840 | 化学技術部 |
| E4040 | 溶出検液作成(B) (7成分以上) | 1試料につき (7成分以上) | 9,020 | 化学技術部 |

③ ガスクロマトグラフ成分分析

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|----------------------------------|-----------|--------|-------|
| E2225 | ガスクロマトグラフによる分析 | 1試料につき | 11,220 | 化学技術部 |
| E2235 | ガスクロマトグラフ定量分析 | 1試料1成分につき | 16,060 | 化学技術部 |
| E2236 | ガスクロマトグラフ定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 6,490 | 化学技術部 |
| E2265 | ヘッドスペースガスクロマトグラフによる分析 | 1試料につき | 16,500 | 化学技術部 |
| E2275 | ヘッドスペースガスクロマトグラフ定量分析 | 1試料1成分につき | 22,770 | 化学技術部 |
| E2276 | ヘッドスペースガスクロマトグラフ定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 6,490 | 化学技術部 |
| E2310 | ガスクロマトグラフ質量分析(GCMS) | 1試料1成分につき | 44,770 | 化学技術部 |
| E2311 | ガスクロマトグラフ質量分析(GCMS) 定性分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 5,720 | 化学技術部 |
| E2312 | ガスクロマトグラフ質量分析(GCMS) 定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 6,710 | 化学技術部 |
| E2330 | ヘッドスペースGCMS分析 | 1試料1成分につき | 57,860 | 化学技術部 |
| E2331 | ヘッドスペースGCMS分析 定性分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 5,720 | 化学技術部 |
| E2332 | ヘッドスペースGCMS分析 定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 6,710 | 化学技術部 |

(ガスクロマトグラフ成分分析)

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|--------------------------------|----------------------------------|--------|-------|
| E2340 | サーマルデソープションGCMS分析 | 1試料1成分につき | 62,150 | 化学技術部 |
| E2341 | サーマルデソープションGCMS分析 定性分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 5,720 | 化学技術部 |
| E2342 | サーマルデソープションGCMS分析 定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 6,710 | 化学技術部 |
| E2350 | 化学イオン化(CI)法によるGCMS分析 | 1試料につき (E2310,E2330,E2340に適用) | 12,980 | 化学技術部 |
| E2360 | 熱分解GCMS分析 | 1試料1成分につき | 58,850 | 化学技術部 |
| E2361 | 熱分解GCMS分析 定性分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 5,720 | 化学技術部 |

④ 液体クロマトグラフ成分分析

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|---|-------------------|--------|-------|
| E2211 | イオンクロマトグラフ分析(1) (一般的なもの) | 1測定につき | 17,600 | 化学技術部 |
| E2212 | イオンクロマトグラフ分析(2) (特殊なもの) | 1測定につき | 22,440 | 化学技術部 |
| E2215 | 試料調製(溶出前処理) | E2211,E2212に適用 | 4,730 | 化学技術部 |
| E2281 | 高速液体クロマトグラフ分析 (分析条件検討を含まない) | 1試料1成分につき | 12,320 | 化学技術部 |
| E2282 | 高速液体クロマトグラフ分析 (簡単な分析条件を含む) | 1試料1成分につき | 31,460 | 化学技術部 |
| E2290 | 液体クロマトグラフー質量分析 (飛行時間型) (分析条件検討を含まない) | 1試料1成分につき | 47,960 | 化学技術部 |
| E2291 | 液体クロマトグラフー質量分析 (飛行時間型) (簡単な分析条件の検討) | 1試料につき (E2290に適用) | 25,520 | 化学技術部 |
| E2292 | 液体クロマトグラフー質量分析 (飛行時間型) 定性分析1成分増 | 1成分増すごとに | 4,510 | 化学技術部 |
| E2294 | 液体クロマトグラフー質量分析 (四重極型) (分析条件検討を含む) | 1試料1成分につき | 41,360 | 化学技術部 |
| E2295 | 液体クロマトグラフー質量分析 (四重極型) (分析条件検討を含まない) | 1試料1成分につき | 21,010 | 化学技術部 |

⑤ 固体・表面分析

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|---|------------------------------|--------|----------|
| E1841 | 蛍光X線法による微小部定性分析 | 1試料, 1ヶ所につき | 9,570 | 化学技術部 |
| E1842 | 蛍光X線法による微小部定性分析 1条件増 | 1条件増すごとに | 3,520 | 化学技術部 |
| E1860 | 蛍光X線定性分析(波長分散方式) | 1試料につき | 22,440 | 化学技術部 |
| E0021 | エネルギー分散型X線分析(EDX) (E0011~E0018、E1790に適用) | 1ヶ所につき | 7,150 | 機械・材料技術部 |
| E1882 | X線光電子分光分析 (簡単なもの) | 1試料1ヶ所につき | 18,150 | 機械・材料技術部 |
| E1884 | X線光電子分光分析 (簡単なもの) 条件増 | 1条件増すごとに | 8,250 | 機械・材料技術部 |
| E1980 | 微小部X線光電子分光分析 (ワイドスキャンのみ) | 1試料1ヶ所につき | 15,840 | 機械・材料技術部 |
| E1982 | 微小部X線光電子分光分析 (ワイドおよびナロースキャン) | 1試料1ヶ所につき(6元素まで) | 23,540 | 機械・材料技術部 |
| E1984 | 微小部X線光電子分光分析(面分析, 線分析) | 1試料1ヶ所につき(5元素まで) | 24,640 | 機械・材料技術部 |
| E1986 | 微小部X線光電子分光分析(深さ方向分析) | 1試料1ヶ所につき(6元素まで) | 37,180 | 機械・材料技術部 |
| E1990 | 微小部X線光電子分光分析 条件増 | 1条件増すごとに | 5,720 | 機械・材料技術部 |
| E1992 | 微小部X線光電子分光分析 元素増(1) | 1元素増すごとに (E1982,E1984に適用) | 4,950 | 機械・材料技術部 |
| E1994 | 微小部X線光電子分光分析 元素増(2) | 1元素増すごとに (E1986に適用) | 7,370 | 機械・材料技術部 |

(固体・表面分析)

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|
| E2570 | 電子線マイクロアナライザ観測(FE-EPMA) | 1ヶ所につき | 29,370 | 機械・材料技術部 |
| E2581 | エネルギー分散型X線分析(EDX) (FE-EPMAによる) | 1ヶ所につき (E2570,E2580に適用) | 7,260 | 機械・材料技術部 |
| E2582 | 表面観察(FE-EPMAによる) 1ヶ所増 | 同一試料で1ヶ所増すごとに (E2570,E2580に適用) | 4,510 | 機械・材料技術部 |
| E2590 | 電子線マイクロアナライザ観測(FE-EPMA) 追加分析 | 1ヶ所につき (E2570,E2580に適用) | 9,130 | 機械・材料技術部 |

⑥ 分光分析・有機物定性分析

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-----------------------|--------------|--------|----------------------------|
| E2021 | フーリエ変換赤外分光分析 | 1スペクトルにつき | 20,350 | 化学技術部 機械・材料技術部 K5055 |
| E2023 | フーリエ変換赤外分光分析用微小試料調製 | 1試料につき | 3,410 | 化学技術部 機械・材料技術部 |
| E2080 | 顕微レーザーラマン分光分析 | 1試料1ヶ所につき | 20,460 | 機械・材料技術部 |
| E2631 | 飛行時間型質量分析 | 1試料1測定につき | 29,810 | 化学技術部 |
| E2651 | 電子スピン共鳴分析(A)(基本測定) | 1試料1スペクトルにつき | 22,220 | 機械・材料技術部 |
| E2652 | 電子スピン共鳴分析(B)(特殊測定・定量) | 1試料1スペクトルにつき | 38,940 | 機械・材料技術部 |

⑦ 試料調製

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---------------------|---|--------|-------|
| E1801 | 試料調製(1)(一般的な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831, E1832,E1860,E1891,E1892,E1911, E1921, E4010, E4020 に適用 | 10,890 | 化学技術部 |
| E1802 | 試料調製(2)(複雑な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831, E1832,E1860,E1891,E1892,E1911, E1921, E4010, E4020 に適用 | 14,300 | 化学技術部 |
| E1803 | 試料調製(3)(困難な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831, E1832,E1860,E1891,E1892,E1911, E1921, E4010, E4020 に適用 | 21,230 | 化学技術部 |
| E1804 | 試料調製(4)(非常に困難な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831, E1832,E1860,E1891,E1892,E1911, E1921, E4010, E4020 に適用 | 29,150 | 化学技術部 |
| E1805 | 切粉作製(A)(加工が容易なもの) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831, E1832,E1860,E1891,E1892,E1911, E1921, E4010, E4020 に適用 | 3,080 | 化学技術部 |
| E1806 | 切粉作製(B)(加工がやや難しいもの) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831, E1832,E1860,E1891,E1892,E1911, E1921, E4010, E4020 に適用 | 10,560 | 化学技術部 |

⑧ 分光光度計

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|-------|----------|
| E2011 | 分光光度計による透過率または拡散反射率測定 (紫外・可視のみ) | 1試料1スペクトルにつき | 5,830 | 機械・材料技術部 |
| E2012 | 分光光度計による透過率または拡散反射率測定 (紫外・可視・近赤外) | 1試料1スペクトルにつき | 6,380 | 機械・材料技術部 |
| E2013 | 分光光度計による正反射率測定 (紫外・可視・近赤外) | 偏光子なしまたは偏光1成分の1試料1スペクトルにつき | 6,820 | 機械・材料技術部 |
| E2014 | 分光光度計による正反射率測定 (紫外・可視・近赤外) 追加(1) | 同一試料・同一条件で偏光1成分追加につき | 3,740 | 機械・材料技術部 |
| E2015 | 分光光度計による正反射率測定 (紫外・可視・近赤外) 追加(2) | 同一試料・同一条件・同一偏光成分で1角度追加につき | 2,090 | 機械・材料技術部 |
| E2016 | 分光光度計による透過率または反射率測定 (特殊なもの) | 1試料1スペクトルにつき | 9,790 | 機械・材料技術部 |
| E2017 | 分光スペクトルによる色彩・色度座標または 太陽光反射率計算 | 1スペクトル1解析につき | 440 | 機械・材料技術部 |

⑨ X線構造解析

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|-------------------------------|--------|--------|----------------|
| E2510 | X線回折試験(Ⅰ) 粉末X線回折 | 1試料につき | 24,090 | 電子技術部 化学技術部 |
| E2520 | X線回折試験(Ⅱ) 高度な粉末X線回折・薄膜X線回折 | 1試料につき | 36,630 | 電子技術部 化学技術部 |
| E2530 | X線回折試験(Ⅲ) 高度な薄膜X線回折 | 1試料につき | 56,650 | 電子技術部 化学技術部 |

⑩ 熱物性

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|-------------------------------|-----------------|--------|-------|
| E2411 | 示差熱重量測定(TG/DTA) 室温~600℃ | 1測定につき | 15,840 | 化学技術部 |
| E2421 | 示差熱重量測定(TG/DTA) 600℃をこえるもの | 1測定につき | 21,120 | 化学技術部 |
| E2432 | 示差走査熱量測定(DSC) | 1測定につき | 17,270 | 化学技術部 |
| E2433 | 示差走査熱量測定(DSC)液体窒素使用 | 1測定につき | 23,430 | 化学技術部 |
| E2441 | 高圧示差熱・熱重量測定 | 1測定につき | 25,630 | 化学技術部 |
| E2442 | 発火温度測定(HP-TG法) | 1測定につき | 22,330 | 化学技術部 |
| E2450 | 複合熱分析 | 1測定につき | 70,290 | 化学技術部 |
| E2460 | 高圧示差走査熱量測定 | 1測定につき | 25,080 | 化学技術部 |
| E2470 | 熱機械測定(TMA)室温~600℃ | 1測定につき | 17,050 | 化学技術部 |
| E2471 | 熱機械測定(TMA)600℃をこえるもの | 1測定につき | 30,140 | 化学技術部 |
| E2472 | 熱機械測定(TMA)液体窒素使用 | 1測定につき | 23,320 | 化学技術部 |
| E2490 | 試料調製(1) (切断, 試験片作製等簡易な前処理) | E2411からE2472に適用 | 3,300 | 化学技術部 |
| E2491 | 試料調製(2) (粉末化等困難な前処理) | E2411からE2472に適用 | 4,950 | 化学技術部 |
| E2492 | 試料調製(3) (溶解, ろ過等複雑な前処理) | E2411からE2472に適用 | 7,370 | 化学技術部 |

⑪ 粉体・表面性能

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|----------------------------------|--------|--------|----------|
| E4150 | 接触角測定試験 | 1試料につき | 2,420 | 機械・材料技術部 |
| E4160 | ゼータ電位測定(A)(微粒子分散溶液) | 1試料につき | 10,340 | 機械・材料技術部 |
| E4170 | ゼータ電位測定(B)(平板形状試料) | 1試料につき | 12,870 | 機械・材料技術部 |
| E4173 | 粒径分布測定(レーザ回折・散乱法) (A)湿式または乾式 | 1試料につき | 6,490 | 機械・材料技術部 |
| E4174 | 粒径分布測定(レーザ回折・散乱法) (B)湿式(有機溶媒) | 1試料につき | 8,470 | 機械・材料技術部 |
| E4175 | 粒径分布測定(レーザ回折・散乱法) (C)特殊なもの | 1試料につき | 10,450 | 機械・材料技術部 |
| E4180 | 粒径分布測定(動的光散乱法) | 1試料につき | 9,020 | 機械・材料技術部 |
| E4183 | 粒径分布測定(静的画像解析法)(A)(簡易な評価) | 1試料につき | 4,730 | 機械・材料技術部 |
| E4184 | 粒径分布測定(静的画像解析法)(B) | 1試料につき | 8,030 | 機械・材料技術部 |
| E4190 | 比表面積測定(窒素ガス吸着法)(1) (容易なもの) | 1試料につき | 21,560 | 機械・材料技術部 |
| E4191 | 比表面積測定(窒素ガス吸着法)(2) (複雑なもの) | 1試料につき | 35,860 | 機械・材料技術部 |
| E4192 | 細孔分布解析 | 1試料につき | 3,630 | 機械・材料技術部 |

⑫ 超臨界試験

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|-----------------------|---------------------------|--------|-------|
| E3310 | 超臨界炭酸ガス抽出 | 1試料、30分間につき | 14,300 | 化学技術部 |
| E3314 | 超臨界炭酸ガス抽出 30分増 | 30分増すごとに(E3310に適用) | 3,850 | 化学技術部 |
| E3312 | エントレーナー使用(超臨界炭酸ガス抽出) | 1試料、30分間につき (E3310に適用) | 4,290 | 化学技術部 |
| E3313 | コールドトラップ使用(超臨界炭酸ガス抽出) | 1試料、30分間につき (E3310に適用) | 2,200 | 化学技術部 |

(2) 工業材料や部品の強さ、硬さ、耐久性等の評価

① 金属・セラミックス・機械部品

単位:円

| No. | 項目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|----------------------------|-----------------|--------|-------------------|
| E0110 | 引張・圧縮・曲げ試験(1)(簡単な試験) | 1試験につき | 2,530 | 機械・材料技術部 |
| E0120 | 引張・圧縮・曲げ試験(2)(比較的簡単な試験) | 1試験につき | 3,740 | 機械・材料技術部 |
| E0130 | 引張・圧縮・曲げ試験(3)(標準的な試験) | 1試験につき | 5,500 | 機械・材料技術部 |
| E0140 | 引張・圧縮・曲げ試験(4)(やや複雑な試験) | 1試験につき | 7,480 | 機械・材料技術部 |
| E0150 | 引張・圧縮・曲げ試験(5)(複雑な試験) | 1試験につき | 10,560 | 機械・材料技術部 |
| E0160 | 製品強度試験(1)(簡単な試験) | 1試験につき | 8,690 | 機械・材料技術部 |
| E0165 | 製品強度試験(2)(標準的な試験) | 1試験につき | 15,510 | 機械・材料技術部 |
| E0170 | 製品強度試験(3)(複雑な試験) | 1試験につき | 24,090 | 機械・材料技術部 |
| E0175 | 常温シャルピー衝撃試験 | 1試料につき | 1,540 | 機械・材料技術部 |
| E0176 | 低温シャルピー衝撃試験 | 1試料につき | 3,410 | 機械・材料技術部 |
| E0180 | 硬さ試験 | 1点につき | 1,100 | 機械・材料技術部 K5330 |
| E0191 | 薄膜・微小部硬さ試験 | 1試料1ヶ所につき | 21,780 | 機械・材料技術部 |
| E0192 | 薄膜・微小部硬さ試験 1ヶ所増 | 1ヶ所増すごとに | 9,680 | 機械・材料技術部 |
| E0211 | トライボ試験 | 1試料1条件につき | 8,360 | 機械・材料技術部 |
| E0212 | トライボ試験 1件増 | 1条件増すごとに | 3,850 | 機械・材料技術部 |
| E0215 | 摩耗試験 | 1試料1条件につき | 7,700 | 機械・材料技術部 |
| E0216 | 摩耗試験 1件増 | 1条件増すごとに | 3,520 | 機械・材料技術部 |
| E0295 | X線応力測定 | 1試料1か所1方向につき | 6,050 | 機械・材料技術部 |
| E0270 | 工具寿命試験 | 1項目につき | 17,160 | 情報・生産技術部 |
| E0310 | 切削抵抗測定 | 1項目につき | 12,650 | 情報・生産技術部 |
| E0415 | 疲労試験 1時間以内 | 1試験につき | 5,060 | 機械・材料技術部 |
| E0420 | 疲労試験 8時間以内 | 1試験につき | 17,050 | 機械・材料技術部 |
| E0431 | 疲労試験 大型構造物 8時間以内 | 1試験につき | 23,540 | 機械・材料技術部 |
| E0435 | 疲労試験 8時間増 (E0420,E0431に適用) | 8時間を超えて8時間増すごとに | 8,580 | 機械・材料技術部 |
| E0440 | 熱間加工性試験 | 1試料につき | 8,250 | 機械・材料技術部 |
| E4620 | ワイヤ放電加工 | 1時間当たり | 4,290 | 情報・生産技術部 |
| E0450 | NC放電加工試験 | 1時間当たり | 2,530 | 情報・生産技術部 |
| E0460 | ホットプレス処理 | 1時間当たり | 9,350 | 機械・材料技術部 |
| E0461 | 制御雰囲気炉処理 | 1時間当たり | 4,620 | 機械・材料技術部 |
| E0462 | 脱脂炉処理 | 1時間当たり | 1,760 | 機械・材料技術部 |
| E0463 | 卓上型電気炉処理 | 1時間当たり | 2,090 | 機械・材料技術部 |
| E0470 | HIP処理 | 1時間当たり | 19,580 | 機械・材料技術部 |
| E0471 | CIP処理 | 1時間当たり | 6,160 | 機械・材料技術部 |
| E0480 | 熱処理特性試験 | 1時間当たり | 12,870 | 機械・材料技術部 |

② 木材

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|--|---------------------|-------|----------|
| E4210 | 圧縮試験 | 1試料につき | 3,190 | 情報・生産技術部 |
| E4220 | 引張試験 | 1試料につき | 3,410 | 情報・生産技術部 |
| E4240 | 曲げ試験(50kN以下) | 1試料につき | 2,750 | 情報・生産技術部 |
| E4241 | 曲げ試験(50kN以下) (曲げ強さ及び曲げヤング係数の算出を必要とするもの) | 1試料につき | 4,180 | 情報・生産技術部 |
| E4250 | 摩耗試験 | 1試料につき | 4,290 | 情報・生産技術部 |
| E4260 | 局所構造試験 | 1試料1測定につき | 3,190 | 情報・生産技術部 |
| E4270 | 密度測定 | 1試料につき | 1,650 | 情報・生産技術部 |
| E4280 | 含水率測定 | 1試料につき | 6,490 | 情報・生産技術部 |
| E4281 | 含水率測定 1増 | 一緒の工程で1試料増すごとに | 2,530 | 情報・生産技術部 |
| E4310 | いす繰返し衝撃試験(1) | 1試料1条件につき(4,000回まで) | 9,020 | 情報・生産技術部 |
| E4320 | いす繰返し衝撃試験(2) 4,000回増 | 同一試料に連続し4,000回増すごとに | 5,170 | 情報・生産技術部 |
| E4350 | いす繰返し耐久性試験(1) | 1試料1条件につき(5,000回まで) | 9,900 | 情報・生産技術部 |
| E4360 | いす繰返し耐久性試験(2) 5,000回増 | 同一試料に連続し5,000回増すごとに | 5,170 | 情報・生産技術部 |
| E4370 | 垂直過重下の強度試験 | 1試料1条件につき | 3,740 | 情報・生産技術部 |
| E4380 | 背もたれの静的強度試験 | 1試料1条件につき | 3,740 | 情報・生産技術部 |
| E4390 | 脚部の静的強度試験 | 1試料1条件につき | 3,740 | 情報・生産技術部 |
| E4480 | 煮沸繰返し試験 | 1試料につき | 2,750 | 情報・生産技術部 |
| E4490 | 温冷水浸せき試験 | 1試料につき | 1,760 | 情報・生産技術部 |
| E4510 | 試料調整(1) (のこ盤、かな盤などによる試験片作製) | 1試料(30分につき) | 1,650 | 情報・生産技術部 |
| E4520 | 試料調整(2) (接着調湿等の前処理を伴うもの) | 1試料につき | 2,530 | 情報・生産技術部 |

③ 糸・繊維

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|-------------------------------|------------|--------|-------|
| E3520 | 耐光試験(カーボンアーク) | 1試料につき20時間 | 1,760 | 化学技術部 |
| E3450 | 繊維熱物性試験 | 1試料1測定につき | 6,050 | 化学技術部 |
| E3460 | 重量測定 | 1試料につき | 660 | 化学技術部 |
| E3620 | 編織物厚さ測定 | 1試料につき | 1,980 | 化学技術部 |
| E3650 | 編織物通気度試験 | 1試料につき | 3,080 | 化学技術部 |
| E3661 | 編織物強伸度測定 | 1試料1方向につき | 3,300 | 化学技術部 |
| E3820 | 糸強伸度測定(容易なもの) | 1試料につき | 1,210 | 化学技術部 |
| E3771 | サーモグラフィによる表面温度測定 | 1時間につき | 4,620 | 化学技術部 |
| E3772 | サーモグラフィによる表面温度測定 (特殊条件の場合) | 1時間につき | 17,380 | 化学技術部 |
| E3930 | 赤外線放射計による放射率測定 | 1試料1測定につき | 38,720 | 化学技術部 |

④ 塗膜・めっき・表面処理等

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-----------------------|---------------------------------|-------|-------|
| E3010 | 塗膜物性試験 | 1試料につき | 1,870 | 化学技術部 |
| E3030 | 光沢度測定 | 1試料につき | 3,740 | 化学技術部 |
| E3040 | 色彩測定 | 1試料につき | 3,630 | 化学技術部 |
| E3050 | 浸せき試験 | 室温で実施の場合 1試料24時間まで (試験液費用は別途負担) | 4,730 | 化学技術部 |
| E3051 | 浸せき試験 24時間増 | 24時間増すごとに | 770 | 化学技術部 |
| E3052 | 浸せき試験用試薬調製 | 1試料につき | 3,410 | 化学技術部 |
| E3060 | 塩水噴霧試験 | 1試料24時間につき | 2,530 | 化学技術部 |
| E3065 | 試験途中の試料観察(槽からの取り出し無し) | 1回につき(E3060に適用) | 440 | 化学技術部 |
| E3066 | 試験途中の試料観察(槽からの取り出し有り) | 1試料1回につき(E3060に適用) | 1,430 | 化学技術部 |
| E3067 | 試験途中の試料洗浄 | 1試料1回につき(E3066に適用) | 660 | 化学技術部 |
| E3068 | 試験途中の試料抜き取り | 1試料1回につき(E3060に適用) | 440 | 化学技術部 |
| E3071 | 煮沸試験 | 1試料8時間につき | 3,630 | 化学技術部 |
| E3080 | 耐熱性試験 | 1試料500℃まで8時間につき | 2,420 | 化学技術部 |
| E3090 | 外観撮影 | 1枚につき | 440 | 化学技術部 |
| E3095 | 外観撮影(色彩調整を要するもの) | 1枚につき | 2,310 | 化学技術部 |

⑤ プラスチック・ゴム物性試験

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|---|--------|-------|
| E1397 | 促進耐候性試験(キセノン) | 標準条件(放射照度60W/m ² 、BPT63℃、スプレー18分/120分)の場合 1試料50時間につき | 20,460 | 化学技術部 |
| E1398 | 試料取付費 | 1ホルダーにつき (E1397に適用) | 3,300 | 化学技術部 |
| E1399 | 試料抜取り費 | 1ホルダーにつき (E1397に適用) | 1,650 | 化学技術部 |
| E2720 | 比重試験(水中置換法)(室温) | 1試料につき | 7,920 | 化学技術部 |
| E2730 | 吸水試験(室温) | 1試料につき | 7,370 | 化学技術部 |
| E2750 | 動的粘弾性測定レオメーター (1走査1時間未満、冷凍機を使用しない場合) | 1走査(温度変化または振動数変化)につき | 18,150 | 化学技術部 |
| E2751 | 動的粘弾性測定DMA (1走査1時間未満、冷凍機を使用しない場合) | 1走査(温度変化または振動数変化)につき | 16,610 | 化学技術部 |
| E2760 | 動的粘弾性測定レオメーター (1走査2時間未満または冷凍機使用) | 1走査(温度変化または振動数変化)につき | 30,030 | 化学技術部 |
| E2761 | 動的粘弾性測定DMA (1走査2時間未満または冷凍機使用) | 1走査(温度変化または振動数変化)につき | 27,390 | 化学技術部 |
| E2770 | 動的粘弾性測定レオメーター (1走査3時間未満または液体窒素使用) | 1走査(温度変化または振動数変化)につき | 45,320 | 化学技術部 |
| E2771 | ペルチェシステム使用(10~150℃) | E2750,E2760に適用 | 7,040 | 化学技術部 |
| E2772 | 試料調整(取り付け困難なもの) | E2750,E2751,E2760,E2761,E2770に適用 | 2,970 | 化学技術部 |
| E2841 | 引張試験(50kN以下) | 1試験片につき | 3,190 | 化学技術部 |
| E2842 | 圧縮試験(50kN以下) | 1試験片につき | 3,190 | 化学技術部 |
| E2843 | 曲げ試験(5kN以下) | 1試験片につき | 3,190 | 化学技術部 |
| E2844 | 動作パターン制御試験 | 1試験片につき | 9,900 | 化学技術部 |
| E2851 | 引張弾性率測定(接触式伸び計使用)(室温) | 1試験片につき | 5,390 | 化学技術部 |
| E2852 | 圧縮弾性率測定(室温) | 1試験片につき | 3,190 | 化学技術部 |
| E2853 | 曲げ弾性率測定(室温) | 1試験片につき | 3,190 | 化学技術部 |
| E2861 | 接着強さ試験 | 1試験片につき | 4,180 | 化学技術部 |

(プラスチック・ゴム物性試験)

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-------------------------|--|--------|-------|
| E2862 | はく離接着強さ試験(室温) | 1試験片につき | 4,620 | 化学技術部 |
| E2863 | 軟質発泡材料圧縮試験(室温) | 1試験片につき | 9,900 | 化学技術部 |
| E2871 | 非接触式伸び計使用 | 1試験片につき(E2841に適用) | 3,190 | 化学技術部 |
| E2872 | 恒温槽使用(-30~200℃) | 1試験片1時間につき (E2841,E2842,E2843,E2844,E2861に適用) | 2,970 | 化学技術部 |
| E2873 | 恒温恒湿槽使用 | 1試験片1時間につき (E2841,E2842,E2843,E2844,E2861に適用) | 4,070 | 化学技術部 |
| E2881 | シャルピー衝撃試験(室温) | 1試験片につき | 2,310 | 化学技術部 |
| E2885 | ノッチ加工 | 1試験片につき(E2881に適用) | 1,980 | 化学技術部 |
| E2920 | 硬さ試験(ロックウェル・デュロメータ)(室温) | 1試料につき | 3,520 | 化学技術部 |
| E2930 | 熱伝導率測定(プローブ法)(室温) | 1試料につき | 10,010 | 化学技術部 |
| E2940 | プラスチック製品の破断面観察 | 1試料につき | 29,150 | 化学技術部 |
| E2941 | プラスチック製品の破断面写真撮影 | 写真1枚につき(E2940に適用) | 2,970 | 化学技術部 |
| E2942 | プラスチック製品の破断面写真撮影(倍率変更) | 写真1枚につき(E2941に適用) | 1,430 | 化学技術部 |
| E2943 | プラスチック製品の外観撮影 | 写真1枚につき(E2940に適用) | 1,430 | 化学技術部 |
| E2944 | 観察試料作製(1)(標準的なもの) | 1試料につき(E2940に適用) | 3,630 | 化学技術部 |
| E2945 | 観察試料作製(2)(複雑なもの) | 1試料につき(E2940に適用) | 7,260 | 化学技術部 |

⑥ 環境試験

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-------------------------|-----------|--------|----------------|
| E1250 | 恒温恒湿槽 | 24時間まで | 24,090 | 電子技術部 |
| E1251 | 恒温恒湿槽 24時間増 | 24時間増すごとに | 9,680 | 電子技術部 |
| E1290 | 高温槽 | 24時間まで | 13,750 | 電子技術部 |
| E1310 | 高温槽 24時間増 | 24時間増すごとに | 6,710 | 電子技術部 |
| E1320 | プレッシャークッカー試験 | 24時間まで | 19,800 | 電子技術部 K5440 |
| E1330 | プレッシャークッカー試験 24時間増 | 24時間増すごとに | 12,210 | 電子技術部 K5441 |
| E1340 | 冷熱衝撃試験(中・ハイパワータイプ) | 8時間まで | 15,510 | 電子技術部 |
| E1341 | 冷熱衝撃試験(中・ハイパワータイプ) 8時間増 | 8時間増すごとに | 7,700 | 電子技術部 |
| E1350 | 冷熱衝撃試験(中) | 8時間まで | 12,100 | 電子技術部 |
| E1360 | 冷熱衝撃試験(中) 8時間増 | 8時間増すごとに | 6,050 | 電子技術部 |
| E1363 | 冷熱衝撃試験(中・TSA) | 8時間まで | 14,520 | 電子技術部 |
| E1364 | 冷熱衝撃試験(中・TSA) 8時間増 | 8時間増すごとに | 7,040 | 電子技術部 |
| E1365 | HAST試験 | 24時間まで | 20,020 | 電子技術部 |
| E1366 | HAST試験 24時間増 | 24時間増すごとに | 13,090 | 電子技術部 |
| E1367 | ハイパワー恒温恒湿槽 | 8時間まで | 17,490 | 電子技術部 |
| E1368 | ハイパワー恒温恒湿槽 8時間増 | 8時間増すごとに | 5,280 | 電子技術部 |
| E1370 | 恒温恒湿槽(大、150℃対応) | 24時間まで | 35,750 | 電子技術部 |
| E1375 | 恒温恒湿槽(大、150℃対応) 24時間増 | 24時間増すごとに | 19,140 | 電子技術部 |
| E1378 | 恒温恒湿槽(低湿度対応, PDL) | 8時間まで | 17,380 | 電子技術部 |
| E1379 | 恒温恒湿槽(低湿度対応, PDL) 8時間増 | 8時間増すごとに | 4,070 | 電子技術部 |
| E1380 | 冷熱衝撃試験(大) | 8時間まで | 16,280 | 電子技術部 |
| E1385 | 冷熱衝撃試験(大) 8時間増 | 8時間増すごとに | 8,250 | 電子技術部 |

(環境試験)

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|----------------------------|--|--------|-------|
| E1390 | 小型恒温恒湿槽(SH, SU600番台) | 24時間まで | 16,170 | 電子技術部 |
| E1391 | 小型恒温恒湿槽(SH, SU600番台) 24時間増 | 24時間増すごとに | 5,940 | 電子技術部 |
| E1392 | 小型恒温恒湿槽(SH, SU200番台) | 24時間まで | 13,090 | 電子技術部 |
| E1393 | 小型恒温恒湿槽(SH, SU200番台) 24時間増 | 24時間増すごとに | 4,730 | 電子技術部 |
| E1386 | パワーサイクル試験 | 8時間まで | 22,990 | 電子技術部 |
| E1387 | パワーサイクル試験 8時間増 | 8時間増すごとに | 11,330 | 電子技術部 |
| E1394 | 人工気象室(小型) | 1時間ごとに | 5,280 | 化学技術部 |
| E1395 | 人工気象室(大型) | 1時間ごとに | 8,360 | 化学技術部 |
| E1396 | 日射装置 | 1時間ごとに(人工気象室(大型)の 料金に加算) | 6,710 | 化学技術部 |
| E1397 | 促進耐候性試験(キセノン) | 標準条件(放射照度60W/m ² 、 BPT63°C、スプレー18分/120分)の 場合 1試料50時間につき | 20,460 | 化学技術部 |
| E1398 | 試料取付費 | 1ホルダーにつき (E1397に適用) | 3,300 | 化学技術部 |
| E1399 | 試料抜取り費 | 1ホルダーにつき (E1397に適用) | 1,650 | 化学技術部 |
| E3520 | 耐光試験(カーボンアーク) | 1試料につき20時間 | 1,760 | 化学技術部 |

⑦ 電気化学試験

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-----------------------|--|--------|-------|
| E3211 | 金属・合金の電極電位測定(1) | 1試料につき4時間まで | 14,410 | 化学技術部 |
| E3212 | 金属・合金の電極電位測定(2) 1時間増 | 1時間増すごとに | 220 | 化学技術部 |
| E3221 | 金属・合金の腐食減量測定(1) | 1試料につき24時間まで | 14,300 | 化学技術部 |
| E3222 | 金属・合金の腐食減量測定(2) 24時間増 | 24時間増すごとに | 4,290 | 化学技術部 |
| E3223 | 異種金属接触腐食電流測定(1) | 1試料につき4時間まで | 14,410 | 化学技術部 |
| E3224 | 異種金属接触腐食電流測定(2) 1時間増 | 1時間増すごとに | 220 | 化学技術部 |
| E3270 | 金属の分極測定 | 1試料につき | 19,250 | 化学技術部 |
| E3275 | 電気化学インピーダンス測定 | 1試料につき | 7,260 | 化学技術部 |
| E3280 | 試料調製(1) (比較的容易) | E3211,E3212,E3221,E3222,E3223, E3224,E3261,E3262,E3270,E3275 に適用 | 3,300 | 化学技術部 |
| E3290 | 試料調製(2) (比較的複雑) | E3211,E3212,E3221,E3222,E3223, E3224,E3261,E3262,E3270,E3275 に適用 | 6,710 | 化学技術部 |
| E3295 | 電極の研磨 | 1試料につき | 1,650 | 化学技術部 |
| E3296 | 腐食液・電解液作製 | 1試料につき | 1,650 | 化学技術部 |

⑧ 燃料電池・二次電池

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---------------------|----------------|--------|-------|
| E3255 | 燃料電池の電極作製(スプレー塗工) | 1時間当たり | 4,730 | 化学技術部 |
| E3241 | 燃料電池の発電試験 | 1時間当たり | 8,470 | 化学技術部 |
| E3253 | 燃料電池スタック試験(1) | 24時間まで(8時間当たり) | 4,510 | 化学技術部 |
| E3254 | 燃料電池スタック試験(2) 24時間増 | 24時間増すごとに | 7,150 | 化学技術部 |
| E3251 | 燃料電池の露点測定(1) | 24時間まで(1時間当たり) | 4,180 | 化学技術部 |
| E3252 | 燃料電池の露点測定(2) 24時間増 | 24時間増すごとに | 25,520 | 化学技術部 |
| E3242 | 電解質膜のガス透過性測定 | 1試料につき(1時間当たり) | 6,380 | 化学技術部 |
| E3261 | 電池充放電試験(1) | 1試料につき6時間まで | 23,760 | 化学技術部 |
| E3262 | 電池充放電試験(2) 6時間増 | 6時間増すごとに | 10,780 | 化学技術部 |

(燃料電池・二次電池)

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--------------------------|--|-------|-------|
| E3263 | 電極の熱ロールプレス処理 | 1試料1時間につき | 4,070 | 化学技術部 |
| E3265 | 大型電池充放電試験(2kW以下)(1) | 1試料につき6時間まで | 9,020 | 化学技術部 |
| E3266 | 大型電池充放電試験(2kW以下)(2) 6時間増 | 6時間増すごとに | 5,940 | 化学技術部 |
| E3280 | 試料調製(1) (比較的容易) | E3211,E3212,E3221,E3222,E3223, E3224,E3261,E3262,E3270に適用 | 3,300 | 化学技術部 |
| E3290 | 試料調製(2) (比較的複雑) | E3211,E3212,E3221,E3222,E3223, E3224,E3261,E3262,E3270に適用 | 6,710 | 化学技術部 |

(3) 機械機器、電気・電子部品等の性能の評価

① 電気・機械機器

単位:円

| No. | 項目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|-----------|--------|----------|
| E0510 | 電流電圧測定 | 1試料1条件につき | 3,080 | 電子技術部 |
| E0525 | 電圧・電流波形測定(オシロスコープ) | 2時間まで | 13,970 | 電子技術部 |
| E0535 | 電圧・電流波形測定(オシロスコープ) 1時間増 | 1時間増すごとに | 6,160 | 電子技術部 |
| E0570 | 低抵抗測定 | 1試料1条件につき | 4,180 | 電子技術部 |
| E0660 | 電気機器・漏れ電流測定 | 1試料1条件につき | 4,400 | 電子技術部 |
| E0670 | 電気機器・耐電圧試験 | 1試料1測定につき | 4,290 | 電子技術部 |
| E0680 | 電気機器・接地回路の抵抗測定 | 1試料1条件につき | 4,290 | 電子技術部 |
| E0750 | 絶縁抵抗試験 | 1試料1条件につき | 5,170 | 電子技術部 |
| E0760 | 電気機器・温度試験 | 1測定点につき | 3,190 | 電子技術部 |
| E0820 | 電気機器・電力測定 | 1試料1条件につき | 5,500 | 電子技術部 |
| E0890 | イーサネットコンプライアンステスト | 1時間につき | 5,170 | 情報・生産技術部 |
| E0910 | 磁化特性測定(VSM方式) | 1試料1測定につき | 6,710 | 電子技術部 |
| E0920 | 磁化特性測定(積分方式) | 1試料1測定につき | 4,840 | 電子技術部 |
| E0930 | 磁歪測定 | 1試料1測定につき | 18,920 | 電子技術部 |
| E0931 | 磁歪測定 1条件増 | 1条件増すごとに | 12,210 | 電子技術部 |
| E0940 | 磁化温度特性測定 | 1試料1測定につき | 22,110 | 電子技術部 |
| E0950 | 薄膜交流透磁率測定 | 1試料1測定につき | 6,050 | 電子技術部 |
| E0951 | 交流磁化特性測定 (B-H曲線、鉄損、透磁率、インダクタンス) | 1試料1測定につき | 10,450 | 電子技術部 |
| E0952 | 交流磁化特性測定 (B-H曲線、鉄損、透磁率、インダクタンス) 1条件増 | 1条件増すごとに | 6,930 | 電子技術部 |
| E0953 | 交流磁化特性測定 (B-H曲線無し)の連続測定、可変条件は1) | 1試料5測定まで | 17,490 | 電子技術部 |
| E0954 | 交流磁化特性測定 (B-H曲線無し)の連続測定、可変条件は1) 1測定増 | 1測定増すごとに | 2,640 | 電子技術部 |
| E0958 | 試料調整 | 1時間当たり | 3,300 | 電子技術部 |
| E0959 | データ処理 | 1時間当たり | 3,300 | 電子技術部 |
| E4820 | 適合性試験(FL-net) | 1試料6時間まで | 53,240 | 情報・生産技術部 |
| E4821 | 相互接続性試験(FL-net) | 1試料2時間まで | 35,420 | 情報・生産技術部 |
| E4910 | ノイズ試験(CC-Link) | 1試料8時間まで | 31,790 | 情報・生産技術部 |
| E4920 | ハードウェア試験(CC-Link) | 1試料4時間まで | 15,840 | 情報・生産技術部 |
| E4930 | ソフトウェア試験(CC-Link) | 1試料10時間まで | 39,710 | 情報・生産技術部 |
| E4940 | 組み合わせ試験(CC-Link) | 1試料6時間まで | 23,760 | 情報・生産技術部 |
| E4950 | インタオペラビリティ試験(CC-Link) | 1試料5時間まで | 19,800 | 情報・生産技術部 |
| E4960 | エージング試験(CC-Link) | 1試料12時間まで | 14,190 | 情報・生産技術部 |

② デバイス・実装

単位:円

| No. | 項目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-------------------------|-----------------|--------|-------|
| E1060 | フォトルミネッセンス測定 | 1試料1条件につき | 46,310 | 電子技術部 |
| E1070 | 高分解能(1nm以下)フォトルミネッセンス測定 | 1試料1条件につき | 74,250 | 電子技術部 |
| E1080 | 低温光特性評価 | 1試料1条件につき | 36,960 | 電子技術部 |
| E1120 | 酸化拡散試験 | 1時間当たり | 23,650 | 電子技術部 |
| E1130 | 光干渉式膜厚測定 | 1試料1測定点につき | 3,190 | 電子技術部 |
| E1140 | 光干渉式膜厚測定 1測定点増 | 1試料につき1測定点増すごとに | 1,540 | 電子技術部 |
| E1152 | ホール効果測定 | 1試料1条件につき | 21,670 | 電子技術部 |
| E0767 | 熱抵抗測定 | 1時間当たり | 9,350 | 電子技術部 |

(デバイス・実装)

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------------------|------------------|--------|-------|
| E1153 | 超音波ウェッジボンダ試験 | 1時間当たり | 8,910 | 電子技術部 |
| E1154 | 超音波ボールボンダ試験 | 1時間当たり | 11,000 | 電子技術部 |
| E0775 | 接合強度試験(はんだ継手強度試験) | 1測定条件につき(5測定点まで) | 9,130 | 電子技術部 |
| E0776 | 接合強度試験(ワイヤーボンディング強度試験) | 1測定条件につき(5測定点まで) | 10,780 | 電子技術部 |
| E0777 | 接合強度試験(ダイシェア試験) | 1測定条件につき(5測定点まで) | 11,660 | 電子技術部 |
| E1156 | 真空蒸着 | 標準1試料当たり | 37,070 | 電子技術部 |
| E1157 | 真空蒸着 1条件増 | 1条件増すごとに | 17,270 | 電子技術部 |
| E1158 | スパッタ成膜 | 標準1試料当たり | 48,950 | 電子技術部 |
| E1180 | アッシャーによるプラズマ処理 | 1条件1時間につき | 18,040 | 電子技術部 |
| E1190 | ECRプラズマエッチング | 標準1試料当たり | 49,720 | 電子技術部 |
| E1191 | 高精度フォトリソグラフィ | 1枚につき | 28,600 | 電子技術部 |
| E1192 | 高精度フォトリソグラフィ 1枚増 | 1枚増すごとに | 10,340 | 電子技術部 |
| E1200 | 電子線リソグラフィ | 1時間当たり | 10,670 | 電子技術部 |
| E1201 | 電子線リソグラフィ試料調製 | 1試料につき | 9,350 | 電子技術部 |
| E1211 | クリーン雰囲気試験 | 1時間当たり | 6,490 | 電子技術部 |
| E0768 | パワー半導体静特性試験 | 1時間当たり | 7,370 | 電子技術部 |
| E0769 | 半導体パラメータ測定 | 1時間当たり | 7,260 | 電子技術部 |

③ 電磁環境・EMC

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---------------------------------------|-----------|--------|-------|
| E0780 | ネットワークアナライザ測定(マルチポート) | 1測定につき | 11,440 | 電子技術部 |
| E0791 | ネットワークアナライザ測定(4ポートまで) | 1試料1条件につき | 7,700 | 電子技術部 |
| E0792 | ネットワークアナライザ測定(4ポートまで) 1件増 | 1条件増すごとに | 2,970 | 電子技術部 |
| E0835 | マイクロ波・ミリ波伝送特性測定 (Sパラメータ・TDR測定) | 1条件1測定につき | 18,040 | 電子技術部 |
| E0836 | マイクロ波・ミリ波伝送特性測定 (Sパラメータ・TDR測定) 1件増 | 1測定増すごとに | 4,730 | 電子技術部 |
| E0845 | マイクロ波・ミリ波伝送特性測定 (プローバー測定) | 1条件1測定につき | 32,120 | 電子技術部 |
| E0846 | マイクロ波・ミリ波伝送特性測定 (プローバー測定) 1件増 | 1測定増すごとに | 5,390 | 電子技術部 |
| E0850 | マイクロ波誘電率測定 (共振器法・誘電体プローブ法) | 1条件1測定につき | 19,140 | 電子技術部 |
| E0860 | マイクロ波誘電率測定 (共振器法・誘電体プローブ法) 1件増 | 1測定増すごとに | 6,380 | 電子技術部 |
| E0870 | マイクロ波誘電率・透磁率測定 (Sパラメータ法) | 1条件1測定につき | 17,600 | 電子技術部 |
| E0880 | マイクロ波誘電率・透磁率測定 (Sパラメータ法) 1件増 | 1測定増すごとに | 4,950 | 電子技術部 |
| E0881 | マイクロ波誘電率・透磁率測定 (ハーモニック共振器法) | 1測定につき | 20,130 | 電子技術部 |
| E0882 | マイクロ波誘電率測定 (BCDR法) | 1条件1測定につき | 39,380 | 電子技術部 |
| E1410 | 放射妨害波測定 | 2時間まで | 40,810 | 電子技術部 |
| E1420 | 放射妨害波測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 15,730 | 電子技術部 |
| E1425 | 車載機器の放射・伝導妨害波測定 | 2時間まで | 40,810 | 電子技術部 |
| E1426 | 車載機器の放射・伝導妨害波測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 15,730 | 電子技術部 |
| E1430 | 電源・通信ポート伝導妨害波測定 | 1時間まで | 24,970 | 電子技術部 |
| E1440 | 電源・通信ポート伝導妨害波測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 15,620 | 電子技術部 |

(電磁環境・EMC)

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|--|------------------------|--------|-------|
| E1450 | 雑音電力測定 | 1時間まで | 24,970 | 電子技術部 |
| E1460 | 雑音電力測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 15,620 | 電子技術部 |
| E1472 | 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 | 2時間まで | 31,900 | 電子技術部 |
| E1482 | 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 12,760 | 電子技術部 |
| E1490 | 静電気放電イミュニティ試験 | 1時間まで | 12,760 | 電子技術部 |
| E1510 | 静電気放電イミュニティ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 7,370 | 電子技術部 |
| E1520 | 電氣的ファーストランジェント/ バーストイミュニティ試験 | 1時間まで | 12,760 | 電子技術部 |
| E1530 | 電氣的ファーストランジェント/ バーストイミュニティ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 7,370 | 電子技術部 |
| E1540 | 雷サージイミュニティ試験 | 1時間まで | 12,760 | 電子技術部 |
| E1550 | 雷サージイミュニティ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 7,370 | 電子技術部 |
| E1553 | 誘導伝導電磁界イミュニティ試験 | 1時間まで | 19,580 | 電子技術部 |
| E1554 | 誘導伝導電磁界イミュニティ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 13,090 | 電子技術部 |
| E1555 | 電圧ディップ, 短時間停電及び電圧変動イミュニティ試験 | 1時間まで | 10,120 | 電子技術部 |
| E1556 | 電圧ディップ, 短時間停電及び電圧変動イミュニティ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 5,610 | 電子技術部 |
| E1560 | インパルスノイズ試験 | 1時間まで | 12,760 | 電子技術部 |
| E1570 | インパルスノイズ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 7,370 | 電子技術部 |
| E1581 | 電磁波シールド効果測定 (100kHz~1GHz、KEC法) | 1試料1測定(電界または磁界)につ き | 6,490 | 電子技術部 |
| E1600 | マイクロ波電磁波シールド効果測定 (1GHz~8.5GHz、2焦点型扁平空洞) | 1試料1測定につき | 7,370 | 電子技術部 |
| E1605 | 電波透過特性測定(マイクロ波帯) | 1条件1測定につき | 16,940 | 電子技術部 |
| E1606 | 電波透過特性測定(マイクロ波帯) 1件増 | 1測定増すごとに | 7,810 | 電子技術部 |
| E1610 | 電波吸収率測定(簡易アンテナ法) | 1条件1測定につき | 14,300 | 電子技術部 |
| E1620 | 電波吸収率測定(簡易アンテナ法) 1件増 | 1測定増すごとに | 3,960 | 電子技術部 |

④ 温湿度・環境

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|----------------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| E1250 | 恒温恒湿槽 | 24時間まで | 24,090 | 電子技術部 |
| E1251 | 恒温恒湿槽 24時間増 | 24時間増すごとに | 9,680 | 電子技術部 |
| E1290 | 高温槽 | 24時間まで | 13,750 | 電子技術部 |
| E1310 | 高温槽 24時間増 | 24時間増すごとに | 6,710 | 電子技術部 |
| E1320 | プレッシャークッカー試験 | 24時間まで | 19,800 | 電子技術部 K5440 |
| E1330 | プレッシャークッカー試験 24時間増 | 24時間増すごとに | 12,210 | 電子技術部 K5441 |
| E1340 | 冷熱衝撃試験(中・ハイパワータイプ) | 8時間まで | 15,510 | 電子技術部 |
| E1341 | 冷熱衝撃試験(中・ハイパワータイプ) 8時間増 | 8時間増すごとに | 7,700 | 電子技術部 |
| E1350 | 冷熱衝撃試験(中) | 8時間まで | 12,100 | 電子技術部 |
| E1360 | 冷熱衝撃試験(中) 8時間増 | 8時間増すごとに | 6,050 | 電子技術部 |
| E1363 | 冷熱衝撃試験(中・TSA) | 8時間まで | 14,520 | 電子技術部 |
| E1364 | 冷熱衝撃試験(中・TSA) 8時間増 | 8時間増すごとに | 7,040 | 電子技術部 |
| E1365 | HAST試験 | 24時間まで | 20,020 | 電子技術部 |
| E1366 | HAST試験 24時間増 | 24時間増すごとに | 13,090 | 電子技術部 |
| E1367 | ハイパワー恒温恒湿槽 | 8時間まで | 17,490 | 電子技術部 |
| E1368 | ハイパワー恒温恒湿槽 8時間増 | 8時間増すごとに | 5,280 | 電子技術部 |
| E1370 | 恒温恒湿槽(大、150℃対応) | 24時間まで | 35,750 | 電子技術部 |
| E1375 | 恒温恒湿槽(大、150℃対応) 24時間増 | 24時間増すごとに | 19,140 | 電子技術部 |
| E1378 | 恒温恒湿槽(低湿度対応, PDL) | 8時間まで | 17,380 | 電子技術部 |
| E1379 | 恒温恒湿槽(低湿度対応, PDL) 8時間増 | 8時間増すごとに | 4,070 | 電子技術部 |
| E1380 | 冷熱衝撃試験(大) | 8時間まで | 16,280 | 電子技術部 |
| E1385 | 冷熱衝撃試験(大) 8時間増 | 8時間増すごとに | 8,250 | 電子技術部 |
| E1390 | 小型恒温恒湿槽(SH, SU600番台) | 24時間まで | 16,170 | 電子技術部 |
| E1391 | 小型恒温恒湿槽(SH, SU600番台) 24時間増 | 24時間増すごとに | 5,940 | 電子技術部 |
| E1392 | 小型恒温恒湿槽(SH, SU200番台) | 24時間まで | 13,090 | 電子技術部 |
| E1393 | 小型恒温恒湿槽(SH, SU200番台) 24時間増 | 24時間増すごとに | 4,730 | 電子技術部 |
| E1386 | パワーサイクル試験 | 8時間まで | 22,990 | 電子技術部 |
| E1387 | パワーサイクル試験 8時間増 | 8時間増すごとに | 11,330 | 電子技術部 |
| E1394 | 人工気象室(小型) | 1時間ごとに | 5,280 | 化学技術部 |
| E1395 | 人工気象室(大型) | 1時間ごとに | 8,360 | 化学技術部 |
| E1396 | 日射装置 | 1時間ごとに(人工気象室(大型)の 料金に加算) | 6,710 | 化学技術部 |

⑤ 音響・振動

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--------------------|-------------|--------|----------|
| E4974 | 時間波形分析(振動) | 1分析につき | 3,740 | 機械・材料技術部 |
| E4975 | 周波数分析(振動) | 1分析につき | 5,500 | 機械・材料技術部 |
| E4976 | 振動試験 | 1時間当たり | 8,690 | 機械・材料技術部 |
| E4977 | 損失係数測定(A) | 1試料1測定温度につき | 13,530 | 機械・材料技術部 |
| E4978 | 損失係数測定(B) 1測定温度増 | 1測定温度増すごとに | 1,430 | 機械・材料技術部 |
| E4979 | 振動試験 (大型の試験機によるもの) | 1時間当たり | 11,110 | 機械・材料技術部 |
| E4980 | 騒音測定 | 1測定につき | 2,750 | 機械・材料技術部 |
| E4981 | オクターブ分析 | 1分析につき | 3,300 | 機械・材料技術部 |
| E4982 | 時間波形分析(音) | 1分析につき | 3,630 | 機械・材料技術部 |
| E4983 | 周波数分析(音) | 1分析につき | 5,500 | 機械・材料技術部 |
| E4984 | 音響パワーレベル測定 | 1測定につき | 11,110 | 機械・材料技術部 |
| E4985 | 音圧分布測定 | 1測定面につき | 16,610 | 機械・材料技術部 |
| E4986 | 音質評価解析 | 1測定につき | 6,270 | 機械・材料技術部 |
| E4988 | 音響インピーダンス及び伝搬定数測定 | 1測定につき | 7,920 | 機械・材料技術部 |
| E4989 | 垂直入射吸音率測定 | 1測定につき | 5,170 | 機械・材料技術部 |

⑥ デザイン・造形

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------------------------|--------|-------|----------|
| E0490 | 立形マシニングセンタによる加工 | 1時間当たり | 7,040 | 情報・生産技術部 |
| E0495 | 5軸制御マシニングセンタによる加工 | 1時間当たり | 7,590 | 情報・生産技術部 |
| E4990 | 機械設計・解析 | 1時間当たり | 6,160 | 情報・生産技術部 |
| E5001 | 弾塑性解析(塑性加工のシミュレーション解析) | 1時間当たり | 9,020 | 情報・生産技術部 |
| E4994 | 構造解析 | 1時間当たり | 9,460 | 機械・材料技術部 |
| E4997 | 三次元造形前処理 | 1時間当たり | 3,410 | 情報・生産技術部 |
| E4991 | 三次元造形 (小型インクジェット式3Dプリンター) | 1時間当たり | 770 | 情報・生産技術部 |
| E4998 | 三次元造形 (インクジェット式3Dプリンター) | 1時間当たり | 2,970 | 情報・生産技術部 |
| E5000 | 三次元造形 (光造形式3Dプリンター) | 1時間当たり | 1,430 | 情報・生産技術部 |
| E4999 | 三次元造形後処理 | 1時間当たり | 3,630 | 情報・生産技術部 |
| E5280 | デザイン・企画 | 1時間につき | 3,410 | 事業化支援部 |

⑦ 寸法測定・形状測定

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-------------------------------|-----------|--------|----------|
| E1150 | 超深度形状測定顕微鏡による観察及び形状測定 | 1測定1解析につき | 9,020 | 電子技術部 |
| E1151 | 超深度形状測定顕微鏡による観察及び形状測定 1解析増 | 1解析増すごとに | 2,420 | 電子技術部 |
| E0225 | 三次元座標測定(接触式測定) | 1時間当たり | 18,480 | 情報・生産技術部 |
| E0230 | 三次元座標測定(光学式測定) | 1時間当たり | 8,470 | 情報・生産技術部 |
| E0245 | 表面粗さ測定 | 1試料1ヶ所につき | 1,430 | 情報・生産技術部 |
| E0255 | 表面形状測定 | 1試料1ヶ所につき | 1,870 | 情報・生産技術部 |
| E0260 | 形状評価 | 1寸法につき | 220 | 情報・生産技術部 |

⑧ 非破壊検査

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|----------------------|--------|--------|----------|
| E0960 | X線透過試験 | 1時間当たり | 7,590 | 機械・材料技術部 |
| E0981 | X線CT撮影 | 1測定につき | 33,440 | 機械・材料技術部 |
| E0985 | 高出力高精細X線CT撮影 | 1時間当たり | 16,830 | 機械・材料技術部 |
| E0990 | 非破壊超音波映像撮影 | 1時間当たり | 9,020 | 電子技術部 |
| E0991 | 非破壊超音波映像撮影 (データ解析のみ) | 1解析当たり | 3,520 | 電子技術部 |

⑨ 観察

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|-------------------------------|-------------|--------|----------|
| E0101 | デジタルマイクロスコープ観察 | 1試料につき | 2,640 | 機械・材料技術部 |
| E0102 | デジタルマイクロスコープ撮影 | 1撮影につき | 1,100 | 機械・材料技術部 |
| E1145 | ハイブリッドレーザー顕微鏡 | 1測定1解析につき | 8,690 | 電子技術部 |
| E1146 | ハイブリッドレーザー顕微鏡 1視野追加 | 1視野追加につき | 4,290 | 電子技術部 |
| E1780 | 走査型プローブ顕微鏡観察 | 標準1条件1測定につき | 23,320 | 電子技術部 |
| E1781 | 走査型プローブ顕微鏡観察 1視野追加 | 1視野追加につき | 10,780 | 電子技術部 |
| E4995 | 高速度カメラ撮影 | 1時間当たり | 6,050 | 情報・生産技術部 |
| E4996 | 高速度カメラ撮影 (アナログ波形データ収集装置併用) | 1時間当たり | 6,490 | 情報・生産技術部 |

(4) 微生物・生化学・食品

① 微生物・生化学・食品

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---------------------------------------|----------------------|--------|-------|
| E5011 | 一般生菌数測定 | 1試料につき | 5,060 | 化学技術部 |
| E5031 | 嫌気性菌数測定 | 1試料につき | 6,380 | 化学技術部 |
| E5036 | 抗菌性評価試験 | 1試料1測定につき | 6,600 | 化学技術部 |
| E5038 | 蛍光顕微鏡観察(生物試料) | 1試料1測定につき | 6,380 | 化学技術部 |
| E5040 | 抗酸化性測定(1) | 1試料につき | 3,960 | 化学技術部 |
| E5041 | 抗酸化性測定(2)(H-ORAC法による) | 1試料につき | 12,760 | 化学技術部 |
| E5060 | 酵素阻害活性測定(1)(複雑なもの) | 1試料につき | 7,700 | 化学技術部 |
| E5061 | 酵素阻害活性測定(2)(容易なもの) | 1試料につき | 5,500 | 化学技術部 |
| E5062 | 抗糖化性測定(1)(複雑なもの) | 1試料につき | 7,370 | 化学技術部 |
| E5063 | 抗糖化性測定(2)(容易なもの) | 1試料につき | 5,500 | 化学技術部 |
| E5090 | 水分定量(常圧乾燥法による) | 1試料につき | 4,950 | 化学技術部 |
| E5091 | 遊離アミノ酸組成分析 | 1試料につき | 43,120 | 化学技術部 |
| E5100 | タンパク質定量 (Bradford法、Lowry法、BCA法による) | 1試料につき | 4,620 | 化学技術部 |
| E5105 | タンパク質電気泳動試験 | 1試料につき | 7,590 | 化学技術部 |
| E5110 | 脂質定量(ソックスレー抽出法による) | 1試料につき | 5,720 | 化学技術部 |
| E5120 | 灰分定量(直接灰化法による) | 1試料につき | 5,500 | 化学技術部 |
| E5130 | 総ポリフェノール定量(Folin-Ciocalteu法による) | 1試料につき | 4,620 | 化学技術部 |
| E5135 | 総アントシアニン定量(pH differential法による) | 1試料につき | 6,930 | 化学技術部 |
| E5136 | 総プロアントシアニン定量(DMAC法による) | 1試料につき | 4,620 | 化学技術部 |
| E5137 | 総フラボノイド定量(塩化アルミニウム法による) | 1試料につき | 5,060 | 化学技術部 |
| E5140 | 炭水化物定量(フェノール-硫酸法による) | 1試料につき | 5,500 | 化学技術部 |
| E5150 | リグニン定量(硫酸法による) | 1試料につき | 9,020 | 化学技術部 |
| E5160 | サフラン試験 | 1試料につき | 24,310 | 化学技術部 |
| E5170 | 凍結乾燥(24時間まで) | 24時間まで | 6,050 | 化学技術部 |
| E5171 | 凍結乾燥(24時間増すごとに) | 24時間増すごとに | 2,640 | 化学技術部 |
| E5175 | 凍結乾燥(温度制御有)(24時間まで) | 24時間まで | 11,770 | 化学技術部 |
| E5176 | 凍結乾燥(温度制御有)(24時間増すごとに) | 24時間増すごとに | 8,140 | 化学技術部 |
| E3325 | 冷却遠心分離 | 1時間まで | 5,390 | 化学技術部 |
| E3326 | 冷却遠心分離 1時間増 | 1時間増すごとに(E3325に適用) | 5,060 | 化学技術部 |
| E5180 | 試料調製(1)(簡易なもの) | E5011~E5176、E3325に適用 | 1,760 | 化学技術部 |
| E5181 | 試料調製(2)(基本的なもの) | E5011~E5176、E3325に適用 | 3,630 | 化学技術部 |
| E5182 | 試料調製(3)(複雑なもの) | E5011~E5176、E3325に適用 | 7,150 | 化学技術部 |
| E5183 | 試料調製(4)(困難なもの) | E5011~E5176、E3325に適用 | 10,890 | 化学技術部 |

(5) その他(成績書の複本・データ等の交付、研究生の指導)

① 成績書の複本・データ等の交付、研究生の指導

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 備考 |
|-------|----------------|-----------------------------|-------|----|
| E5310 | 研究生の指導 | 1人1日につき | 1,100 | |
| E5320 | 研究生の指導 1人増 | 研究生1人増すごとに | 550 | |
| E5350 | 成績書の複本・データ等の交付 | 1通につき(写真を含む場合は別に加算することができる) | 297 | |

2 機器使用料金

(1) 生産・加工機器

① 加工機器

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---------------|-----------------|-------|----------|
| E7750 | 油圧プレス(ホットプレス) | セイブ HP-2 | 330 | 情報・生産技術部 |
| E8810 | 混練機 | 森山 DSI-5GHH-E | 2,750 | 機械・材料技術部 |
| E8820 | 金属粉末射出成形装置 | 東芝機械 IS30EPN-1A | 2,310 | 機械・材料技術部 |

② 工作機器

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--------------|--------------------------|-------|----------|
| E6210 | コンターマシン | アマダ VA-500 | 330 | 情報・生産技術部 |
| E6230 | 平面研削盤 | 岡本 PSG-52DX | 1,650 | 機械・材料技術部 |
| E6240 | ボール盤 | ヤマモト YSDT-550 | 220 | 機械・材料技術部 |
| E6270 | 切断機 | Hストルアス社 ディスコム | 1,430 | 機械・材料技術部 |
| E6310 | 帯鋸盤 | アマダ HA300 | 990 | 情報・生産技術部 |
| E6350 | CNC旋盤 | オークマ LS-30N | 5,500 | 機械・材料技術部 |
| E6340 | 旋盤 | 昌運 ST-5 | 1,320 | 機械・材料技術部 |
| E6360 | 旋盤 | シャブリン SV-150A | 2,090 | 機械・材料技術部 |
| E6370 | フライス盤 | デッケル FP1 | 2,310 | 機械・材料技術部 |
| E6375 | NCフライス盤 | イワシタ NR2 | 2,530 | 情報・生産技術部 |
| E6380 | 立形マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 V33 | 3,740 | 情報・生産技術部 |
| E6730 | 研磨機 | ムサシノ電子 MA-200 | 2,530 | 電子技術部 |
| E6735 | 自動研磨機 | QATM社 サファイア250 A2-ECO | 3,300 | 電子技術部 |
| E7720 | ツールチェンジNC加工機 | 平安コーポレーション NC-151MC-1508 | 2,090 | 情報・生産技術部 |
| E7730 | ルータ | 平安鉄工 NC-131P-1008 | 770 | 情報・生産技術部 |

③ 熱処理

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------|------------------------|--------|----------|
| E6760 | 高温小型真空雰囲気炉 | ナガノ NEWTONIAN PASCAL40 | 5,940 | 電子技術部 |
| E8840 | 電気炉 | 炉研工業 マッフル型加熱炉 HI | 1,430 | 機械・材料技術部 |
| E8980 | シリコニット箱型炉 | シリコニット高熱工業 SFB-2040 | 990 | 機械・材料技術部 |
| E8970 | 熱間加工再現試験装置 | 富士電波工機 サーメックマスター-Z | 12,540 | 機械・材料技術部 |
| E8975 | 熱処理再現試験装置 | 富士電波工機 特注品FTA-153VTほか | 9,570 | 機械・材料技術部 |

④ 電子・半導体(加工)

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------|------------------|--------|-------|
| E6680 | 陽極接合装置 | アユミ工業 AB-40特注品 | 12,870 | 電子技術部 |
| E6690 | マスクアライナ | ミカサ MA-20 | 7,590 | 電子技術部 |
| E6740 | 酸化拡散装置 | KHエレクトロニクス 特別仕様 | 19,360 | 電子技術部 |
| E6770 | 超音波ボールボンダ | ウエストボンド 7700A | 7,700 | 電子技術部 |
| E6790 | チップ付け装置 | ウエストボンド 7200A | 2,860 | 電子技術部 |
| E6810 | 超音波ウェッジボンダ | ウエストボンド 7400A | 5,610 | 電子技術部 |
| E6880 | アッシャー装置 | 東京応化工業 OPM-EM600 | 12,650 | 電子技術部 |

(2) 環境試験・電磁環境試験機器

① 人工気象室

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-------|---------------------|--------|-------|
| E7310 | 人工気象室 | タバイエスペック TBL-9W4YPX | 14,190 | 化学技術部 |

② 電磁環境試験機器

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|----------------|------------------|-------|-------|
| E8270 | 伝導イミュニティ測定システム | ノイズ研究所 ESS-B3011 | 4,070 | 電子技術部 |

③ 騒音・振動

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--------|---------|-------|----------|
| E7470 | 簡易半無響室 | 小野測器 | 1,650 | 機械・材料技術部 |

(3) 試料調製用機器

① 遠心分離機

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|
| E8725 | 冷却遠心機 | エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ CR21N | 1,760 | 化学技術部 |

② 熱処理

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------|------------------------|--------|----------|
| E6760 | 高温小型真空雰囲気炉 | ナガノ NEWTONIAN PASCAL40 | 5,940 | 電子技術部 |
| E8840 | 電気炉 | 炉研工業 マッフル型加熱炉 HI | 1,430 | 機械・材料技術部 |
| E8980 | シリコニット箱型炉 | シリコニット高熱工業 SFB-2040 | 990 | 機械・材料技術部 |
| E8970 | 熱間加工再現試験装置 | 富士電波工機 サーマックマスターZ | 12,540 | 機械・材料技術部 |
| E8975 | 熱処理再現試験装置 | 富士電波工機 特注品FTA-153VTほか | 9,570 | 機械・材料技術部 |

③ 塗装

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---------|--------------------|-------|-------|
| E8910 | 乾式塗装ブース | サンエス工業 DS-CSS-1200 | 1,980 | 化学技術部 |

④ バイオ

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--------------|--------------|-----|-------|
| E9040 | 濃縮機(遠心式濃縮機) | タイテック VC-96N | 110 | 化学技術部 |
| E9060 | フレンチプレス細胞破碎機 | アミンコ FA078 | 440 | 化学技術部 |

(4) 試験・計測機器

① 形状測定

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|----------|-----------------------------|-------|----------|
| E7830 | 表面形状測定装置 | 東京精密 サーフコム NEX241 SD2-13 | 1,980 | 情報・生産技術部 |

② 厚さ・膜厚

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|----------|
| E6950 | 光干渉式膜厚測定装置 | 大日本スクリーン VM-8000J | 3,080 | 電子技術部 |
| E7830 | 表面形状測定装置 | 東京精密 サーフコム NEX241 SD2-13 | 1,980 | 情報・生産技術部 |

③ 強度試験機

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------|--------------------------|--------|----------|
| E6050 | 材料試験機(5kN) | インストロンジャパン 5565型 | 1,320 | 化学技術部 |
| E8711 | 振動試験機 | IMV VS-2000A-140T | 5,280 | 機械・材料技術部 |
| E8712 | 振動試験機(大型) | IMV i250/SA5M | 7,370 | 機械・材料技術部 |
| E8713 | 制振性能測定装置 | ブリュエルケアー PULSE/MS-18143型 | 4,620 | 機械・材料技術部 |
| E8970 | 熱間加工再現試験装置 | 富士電波工機 サーマックマスター-Z | 12,540 | 機械・材料技術部 |
| E8975 | 熱処理再現試験装置 | 富士電波工機 特注品FTA-153VTほか | 9,570 | 機械・材料技術部 |
| E6080 | 万能材料試験機 | オリエンテック UTA-5T | 1,320 | 情報・生産技術部 |

④ 物理特性試験機

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-----------------------|------------------------|--------|----------|
| E8090 | ボロメータ測定システム微小信号測定システム | セイコー 5302 | 4,950 | 電子技術部 |
| E8260 | 音響インテンシティ測定装置 | 小野測器 CF6400INT/MOD | 11,110 | 機械・材料技術部 |
| E8261 | 音質評価システム | 小野測器 WS-5160 | 3,960 | 機械・材料技術部 |
| E8263 | 垂直入射吸音率測定システム | 日本音響エンジニアリング WinZacMTX | 1,540 | 機械・材料技術部 |
| E8550 | 風合い計測システム | カトーテック KES-F7サーモラボⅡ | 3,630 | 化学技術部 |
| E8580 | プラスチック用熱伝導率計 | 京都電子工業 QTM-D3型 | 4,950 | 化学技術部 |
| E8620 | 赤外線放射計 | 日本バーンズ SA-200 | 8,360 | 化学技術部 |
| E9016 | 摩耗試験機(研磨紙使用無し) | 東洋精機 NO410 GS10付 | 220 | 情報・生産技術部 |

⑤ 電気計測機器

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|-------|
| E8200 | 絶縁抵抗計(表面および体積抵抗のみ) | キーサイト・テクノロジー 4339B | 3,300 | 電子技術部 |
| E8220 | LCRメータ | YHP YHP4285A | 3,190 | 電子技術部 |
| E8431 | ガウスメータ(最小測定レンジ:0.35mT、最大測定レンジ:3.5T) | Lake shore Inc 455型 | 1,430 | 電子技術部 |

(5) 分析・評価機器(観察)

① 光学顕微鏡

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---------------------|---------------------------------|-------|----------|
| E7150 | デジタルマイクロスコープ | ハイロックス HRX-01 | 1,980 | 機械・材料技術部 |
| E6960 | 超深度形状測定顕微鏡(レーザー顕微鏡) | キーエンス VK8500 | 2,090 | 電子技術部 |
| E6965 | ハイブリッドレーザー顕微鏡 データ解析 | レーザーテック OPTELICS HYBRID | 880 | 電子技術部 |
| E7020 | 金属顕微鏡 | ニコン X2-T1-NR | 550 | 機械・材料技術部 |
| E7160 | 顕微鏡 | オリンパス CKX41N-31PHP | 770 | 化学技術部 |
| E7180 | 蛍光顕微鏡(生物試料) | サーモフィッシャー サイエンティフィック AMF5000 | 2,640 | 化学技術部 |
| E7810 | 万能測定顕微鏡 | カールツァイス UMM300/100 | 2,090 | 情報・生産技術部 |

② 内部観察機器

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------------|-------------------------------|--------|----------|
| E7230 | X線透視装置 | 島津製作所 SMX-2000 | 4,290 | 機械・材料技術部 |
| E7240 | X線CTスキャン装置 | ユニハイトシステム XVA-160 Noix+Presto | 13,310 | 機械・材料技術部 |
| E7280 | 透明プラスチック残留応力観察装置 | 理光研 ホﾟラリスコープPS-5 | 1,650 | 化学技術部 |

(6) 分析・評価機器(物性[光、熱、音振、エネルギー])

① 分光分析

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------------|------------------------|-------|-------|
| E9061 | マルチ検出モードプレートリーダー | テカンジャパン Infinite200Pro | 1,430 | 化学技術部 |
| E7170 | 分光蛍光光度計 | 日立 F-4010 | 4,400 | 化学技術部 |

② 熱分析

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---------|-------------------------|--------|-------|
| E7360 | 断熱反応装置 | コロンビアサイエ ンティフィック ARC | 9,240 | 化学技術部 |
| E7370 | 熱流束型熱量計 | セタラム C-80 | 20,680 | 化学技術部 |
| E8610 | 熱機械試験機 | マック・サイエンス TMA-4000 | 6,270 | 化学技術部 |

③ 反応熱量計

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---------|-------------------------|--------|-------|
| E7360 | 断熱反応装置 | コロンビアサイエ ンティフィック ARC | 9,240 | 化学技術部 |
| E7370 | 熱流束型熱量計 | セタラム C-80 | 20,680 | 化学技術部 |

(7) その他(製品開発室・ファブラボ)

① 製品開発室

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | 所 在 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------------|------------|-----|--------|
| E9210 | 製品開発室 | 実験棟 1・2・4階 | 88 | 事業化支援部 |
| E9220 | ドラフトチャンバー(製品開発室) | 実験棟 1階 | 220 | 事業化支援部 |

② ファブラボ

単位:円(1時間当たり)

| No. | 設備機器名 | 所 在 | 料金 | 担当部名 |
|-------|----------|-------------------------|-------|-------|
| E9610 | ファブラボ(Ⅰ) | 3Dプリンタ使用可 装置類取扱い指導有 | 3,300 | 電子技術部 |
| E9620 | ファブラボ(Ⅱ) | 3Dプリンタ使用可 装置類取扱い指導無 | 550 | 電子技術部 |
| E9630 | ファブラボ(Ⅲ) | 3Dプリンタ使用不可 装置類取扱い指導無 | 220 | 電子技術部 |

1 試験計測料金

(1) 材料解析分野

① 機器分析

走査型X線光電子分光分析装置 (μ -XPS・ μ -ESCA)

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--|----------------------------------|--------|---------|
| K5002 | X線光電子分光分析(XPS)表面分析(ワイドスキャンのみ) | 1試料1ヶ所につき(ワイドスキャンのみ) | 27,610 | 川崎技術支援部 |
| K5005 | X線光電子分光分析(XPS)表面分析(ワイドスキャンのみ 追加試料) | 追加1試料1ヶ所につき(ワイドスキャンのみ) | 21,780 | 川崎技術支援部 |
| K5007 | X線光電子分光分析(XPS)表面分析(ワイドスキャンのみ 条件増) | 1条件増すごとに(ワイドスキャンのみ) | 5,610 | 川崎技術支援部 |
| K5011 | X線光電子分光分析(XPS)表面分析(ワイドおよびナローズスキャン) | 1試料1条件につき(ワイドおよびナローズスキャン) | 49,060 | 川崎技術支援部 |
| K5012 | X線光電子分光分析(XPS)表面分析(ワイドおよびナローズスキャン 条件増) | 1条件増すごとに(面分析、状態分析加算等) | 11,330 | 川崎技術支援部 |
| K5010 | X線光電子分光分析(XPS)深さ方向分析 | 1試料1条件につき(主成分のみ、深さ0.2 μ mまで) | 82,940 | 川崎技術支援部 |
| K5015 | X線光電子分光分析(XPS)深さ方向分析 条件増 | 1条件増すごとに | 11,330 | 川崎技術支援部 |

フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---------------------------|-----------|--------|------------------|
| K5050 | フーリエ変換赤外分光分析(FT-IR) 簡易な測定 | 1試料1条件につき | 10,230 | 川崎技術支援部 |
| K5055 | フーリエ変換赤外分光分析(FT-IR) | 1試料1条件につき | 20,350 | 川崎技術支援部 E2021 |
| K5056 | フーリエ変換赤外分光分析(FT-IR) 条件追加 | 1条件追加につき | 8,030 | 川崎技術支援部 |

微小蛍光X線分析装置(XRF)

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-------------------------|------------------|--------|---------|
| K1210 | 微小部蛍光X線分析(XRF) | 1試料1条件につき | 7,590 | 川崎技術支援部 |
| K1211 | 微小部蛍光X線分析(XRF) 条件追加 | 1条件追加につき | 3,520 | 川崎技術支援部 |
| K1212 | 微小部蛍光X線分析(XRF) 面分析 | 面分析1条件につき(5元素まで) | 12,100 | 川崎技術支援部 |
| K1213 | 微小部蛍光X線分析(XRF) 面分析 条件追加 | 面分析1条件追加につき | 2,530 | 川崎技術支援部 |

金属顕微鏡

単位:円

| 項目No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-----------------------|---------------|--------|------------------|
| K5110 | 金属組織写真撮影 | 写真1枚につき | 11,110 | 川崎技術支援部 E0031 |
| K5112 | 外観写真撮影 | 写真1枚につき | 5,720 | 川崎技術支援部 |
| K5114 | 写真撮影1ヶ所増すごとに | 同一試料で1ヶ所増すごとに | 2,860 | 川崎技術支援部 E0070 |
| K5120 | 顕微鏡試料調製(第1種):容易なもの | 1試料につき | 1,980 | 川崎技術支援部 E0080 |
| K5121 | 顕微鏡試料調製(第2種):標準的なもの | 1試料につき | 3,960 | 川崎技術支援部 E0090 |
| K5122 | 顕微鏡試料調製(第3種):比較的複雑なもの | 1試料につき | 7,810 | 川崎技術支援部 E0091 |
| K5123 | 顕微鏡試料調製(第4種):非常に複雑なもの | 1試料につき | 11,550 | 川崎技術支援部 E0092 |

デジタルマイクロスコープ

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--------------|---------|-------|---------|
| K1910 | デジタルマイクロスコープ | 画像1枚につき | 4,180 | 川崎技術支援部 |

マイクロフォーカスX線検査装置(μF-X線)

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--------------------|----------|-------|---------|
| K1720 | マイクロフォーカスX線検査装置 | 30分以内 | 7,040 | 川崎技術支援部 |
| K1725 | マイクロフォーカスX線検査装置 追加 | 追加15分あたり | 3,080 | 川崎技術支援部 |

硬さ試験機

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------------------|--------|-------|------------------|
| K5330 | 硬さ試験 | 1点につき | 1,100 | 川崎技術支援部 E0180 |
| K5340 | 硬さ試験試料調製(第1種):容易なもの | 1試料につき | 1,980 | 川崎技術支援部 |
| K5341 | 硬さ試験試料調製(第2種):比較的容易なもの | 1試料につき | 3,960 | 川崎技術支援部 |

② 温湿度環境試験

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--------------------|-----------|--------|------------------|
| K5410 | 恒温恒湿槽(中) | 24時間まで | 22,440 | 川崎技術支援部 |
| K5411 | 恒温恒湿槽(中) 24時間増 | 24時間増すごとに | 9,020 | 川崎技術支援部 |
| K5420 | 恒温恒湿槽(小) | 24時間まで | 18,370 | 川崎技術支援部 |
| K5421 | 恒温恒湿槽(小) 24時間増 | 24時間増すごとに | 6,930 | 川崎技術支援部 |
| K5430 | 恒温槽 | 24時間まで | 12,210 | 川崎技術支援部 |
| K5431 | 恒温槽 24時間増 | 24時間増すごとに | 6,270 | 川崎技術支援部 |
| K5440 | プレッシャークッカー試験 | 24時間まで | 19,800 | 川崎技術支援部 E1320 |
| K5441 | プレッシャークッカー試験 24時間増 | 24時間増すごとに | 12,210 | 川崎技術支援部 E1330 |
| K5450 | 冷熱衝撃試験(小) | 8時間まで | 10,780 | 川崎技術支援部 |
| K5451 | 冷熱衝撃試験(小) 8時間増 | 8時間増すごとに | 5,610 | 川崎技術支援部 |

③ 電気計測試験

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--------------|--------|-------|---------|
| K5610 | 絶縁抵抗測定(平板試料) | 1試料につき | 6,050 | 川崎技術支援部 |

(2) 微細構造解析分野

電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM / EDS)

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|--|---------|---------|
| K1010 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍以下 | 観察倍率5万倍以下 1条件につき | 21,450 | 川崎技術支援部 |
| K1015 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍以下 条件追加 | 観察倍率5万倍以下 1条件追加につき | 4,950 | 川崎技術支援部 |
| K1020 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍を超えて10万倍以下 | 観察倍率5万倍を超えて10万倍以下 1条件につき | 31,020 | 川崎技術支援部 |
| K1025 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍を超えて10万倍以下 条件追加 | 観察倍率5万倍を超えて10万倍以下 1条件追加につき | 9,680 | 川崎技術支援部 |
| K1030 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 10万倍を超えるもの | 観察倍率10万倍を超えるもの 1条件につき | 52,470 | 川崎技術支援部 |
| K1035 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 10万倍を超えるもの 条件追加 | 観察倍率10万倍を超えるもの 1条件追加につき | 15,400 | 川崎技術支援部 |
| K1050 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) SEM観察 10~15視野 | 1試料の観察視野が10~15視野につき(観察倍率関係なし。ただし、設定可能な試料に限る) | 114,400 | 川崎技術支援部 |
| K1052 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) SEM観察 16~30視野 | 1試料の観察視野が16~30視野につき(観察倍率関係なし。ただし、設定可能な試料に限る) | 170,060 | 川崎技術支援部 |
| K1055 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) SEM観察 条件追加 | 1条件追加につき | 12,540 | 川崎技術支援部 |
| K1040 | FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) | 1条件につき | 15,400 | 川崎技術支援部 |
| K1041 | FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 条件追加 | 1条件追加につき | 4,950 | 川崎技術支援部 |
| K1042 | FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 面分析 | 面分析1条件につき | 16,390 | 川崎技術支援部 |

高分解能分析走査電子顕微鏡(FE-SEM / EDS)

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--|--|---------|---------------|
| K1310 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 5万倍以下 | 観察倍率5万倍以下 1試料1視野観察につき | 21,120 | 川崎技術支援部 E0011 |
| K1315 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 5万倍以下 1視野追加 | 観察倍率5万倍以下 同一試料において1視野追加観察につき | 4,840 | 川崎技術支援部 E0012 |
| K1320 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 5万倍を超えて10万倍以下 | 観察倍率5万倍を超えて10万倍以下 1試料1視野観察につき | 30,910 | 川崎技術支援部 E0013 |
| K1325 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 5万倍を超えて10万倍以下 1視野追加 | 観察倍率5万倍を超えて10万倍以下 同一試料において1視野追加観察につき | 9,240 | 川崎技術支援部 E0014 |
| K1330 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 10万倍を超えるもの | 観察倍率10万倍を超えるもの 1試料1視野観察につき | 52,250 | 川崎技術支援部 E0015 |
| K1335 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 10万倍を超えるもの 1視野追加 | 観察倍率10万倍を超えるもの 同一試料において1視野追加観察につき | 14,960 | 川崎技術支援部 E0016 |
| K1392 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 10~15視野 | 1試料の観察視野が10~15視野につき(観察倍率関係なし。ただし、設定可能な試料に限る) | 115,940 | 川崎技術支援部 E0017 |
| K1395 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 16~30視野 | 1試料の観察視野が16~30視野につき(観察倍率関係なし。ただし、設定可能な試料に限る) | 173,910 | 川崎技術支援部 E0018 |
| K1342 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 低真空モード | 低真空モードの使用 | 11,220 | 川崎技術支援部 |
| K1343 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 STEM | 透過像観察機能(STEM)の使用 | 11,220 | 川崎技術支援部 |
| K1340 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 1条件追加 | 1条件追加につき | 11,220 | 川崎技術支援部 |

(高分解能分析走査電子顕微鏡(FE-SEM / EDS))

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--|-------------------|--------|---------|
| K1350 | 高分解能分析FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 点分析 | 点分析1視野1箇所につき | 17,380 | 川崎技術支援部 |
| K1351 | 高分解能分析FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 点分析追加 | 点分析同一視野内で1箇所追加につき | 5,170 | 川崎技術支援部 |
| K1352 | 高分解能分析FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 線分析 | 線分析1視野1箇所につき | 23,540 | 川崎技術支援部 |
| K1353 | 高分解能分析FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 線分析追加 | 線分析同一視野内で1箇所追加につき | 8,360 | 川崎技術支援部 |
| K1354 | 高分解能分析FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 面分析 | 面分析1視野につき | 35,860 | 川崎技術支援部 |
| K1356 | 高分解能分析FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 各種データ処理 | 各種データ処理1条件につき | 5,170 | 川崎技術支援部 |

電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM / EDS)

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|-----------------------------|---------|---------|
| K1440 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 10万倍以下 | 倍率 10万倍以下 1視野につき | 19,470 | 川崎技術支援部 |
| K1445 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 10万倍以下 1視野増 | 倍率 10万倍以下 1視野増すごとに | 7,040 | 川崎技術支援部 |
| K1441 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 10万倍を超えて50万倍以下 | 倍率 10万倍を超えて50万倍以下 1視野につき | 25,850 | 川崎技術支援部 |
| K1446 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 10万倍を超えて50万倍以下 1視野増 | 倍率 10万倍を超えて50万倍以下 1視野増すごとに | 14,080 | 川崎技術支援部 |
| K1450 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 50万倍を超えて200万倍以下 | 倍率 50万倍を超えて200万倍以下 1視野につき | 35,530 | 川崎技術支援部 |
| K1455 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 50万倍を超えて200万倍以下 1視野増 | 倍率 50万倍を超えて200万倍以下 1視野増すごとに | 19,470 | 川崎技術支援部 |
| K1451 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 200万倍を超えるもの | 倍率 200万倍を超えるもの 1視野につき | 51,590 | 川崎技術支援部 |
| K1456 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 200万倍を超えるもの 1視野増 | 倍率 200万倍を超えるもの 1視野増すごとに | 29,590 | 川崎技術支援部 |
| K1460 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 試料傾斜調整 | 試料傾斜調整 1条件ごとに | 13,420 | 川崎技術支援部 |
| K1470 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 制限視野回折 | 制限視野回折 1視野につき | 16,500 | 川崎技術支援部 |
| K1471 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 微小領域回折 | 微小領域回折 1視野につき | 29,590 | 川崎技術支援部 |
| K1472 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 明視野像 | 明視野像 1視野につき | 19,470 | 川崎技術支援部 |
| K1473 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 暗視野像 | 暗視野像 1視野につき | 35,530 | 川崎技術支援部 |
| K1510 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 点分析 | 点分析 1試料1測定点につき | 28,710 | 川崎技術支援部 |
| K1515 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 点分析追加 | 点分析 同一試料において1測定点追加につき | 6,160 | 川崎技術支援部 |
| K1540 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 定量分析 | 定量分析 1試料1測定点につき | 24,970 | 川崎技術支援部 |
| K1545 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 定量分析追加 | 定量分析 同一試料において1測定点追加につき | 7,370 | 川崎技術支援部 |
| K1520 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 線分析 | 線分析 1測定5元素までごとに | 68,090 | 川崎技術支援部 |
| K1530 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 面分析 | 面分析 1視野5元素ごとに、または2時間につき | 109,230 | 川崎技術支援部 |
| K1550 | TEM データ処理 | 各種データ処理 1条件につき | 12,320 | 川崎技術支援部 |

分析透過電子顕微鏡(FE-TEM / EDS)

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|---------------------------------|---------|---------|
| K1740 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 観察 10万倍以下 | 観察倍率10万倍以下 1視野につき | 19,690 | 川崎技術支援部 |
| K1741 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 観察 10万倍以下 1視野追加 | 観察倍率10万倍以下 同条件1視野追加につき | 9,900 | 川崎技術支援部 |
| K1745 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 観察 10万倍を超えて50万倍以下 | 観察倍率10万倍を超えて50万倍以下 1視野につき | 26,840 | 川崎技術支援部 |
| K1746 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 観察 10万倍を超えて50万倍以下 1視野追加 | 観察倍率10万倍を超えて50万倍以下 同条件1視野追加につき | 14,850 | 川崎技術支援部 |
| K1750 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 観察 50万倍を超えて200万倍以下 | 観察倍率50万倍を超えて200万倍以下 1視野につき | 35,530 | 川崎技術支援部 |
| K1751 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 観察 50万倍を超えて200万倍以下 1視野追加 | 観察倍率50万倍を超えて200万倍以下 同条件1視野追加につき | 19,690 | 川崎技術支援部 |
| K1755 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 観察 200万倍を超えるもの | 観察倍率200万倍を超えるもの 1視野につき | 51,370 | 川崎技術支援部 |
| K1756 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 観察 200万倍を超えるもの 1視野追加 | 観察倍率200万倍を超えるもの 同条件1視野追加につき | 30,690 | 川崎技術支援部 |
| K1760 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 観察 試料傾斜調整 | 試料傾斜調整 1条件につき | 13,530 | 川崎技術支援部 |
| K1761 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 観察 制限視野回折 | 制限視野回折 1視野につき | 17,160 | 川崎技術支援部 |
| K1768 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 観察 条件追加 | 1条件追加につき | 12,210 | 川崎技術支援部 |
| K1770 | FE-TEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS)面分析 | 面分析 1視野5元素ごとに、または 2時間につき | 108,900 | 川崎技術支援部 |

TEM試料調製

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|----------------------------------|---------|---------|
| K1410 | TEM試料調製 分散法 ふりかけ法 | ふりかけ法 1試料につき | 6,600 | 川崎技術支援部 |
| K1411 | TEM試料調製 分散法 懸濁法 | 懸濁法 1試料につき | 13,090 | 川崎技術支援部 |
| K1425 | TEM試料調製 低エネルギーイオンミリング (ジェントルミル) | 1試料1条件につき | 14,850 | 川崎技術支援部 |
| K1432 | TEM試料調製 電子染色 | 1試料につき | 29,260 | 川崎技術支援部 |
| K1433 | TEM試料調製 樹脂包埋 | 1試料につき | 14,190 | 川崎技術支援部 |
| K1620 | TEM試料調製 FIB-リフトアウト法 | 1試料につき | 88,440 | 川崎技術支援部 |
| K1621 | TEM試料調製 FIB-リフトアウト法 条件追加 | 1条件追加につき | 32,120 | 川崎技術支援部 |
| K1625 | TEM試料調製 FIB-マイクロプロービング法 低加速ガリウムイオン | 低加速ガリウムイオン仕上げ 1試料につき | 122,100 | 川崎技術支援部 |
| K1663 | TEM試料調製 FIB-マイクロプロービング法 低加速ガリウムイオン 試料作製のみ | 低加速ガリウムイオン仕上げ 1試料につき(試料作製のみ) | 134,640 | 川崎技術支援部 |
| K1626 | TEM試料調製 FIB-マイクロプロービング法 低加速ガリウムイオン条件追加 | 低加速ガリウムイオン仕上げ 1条件追加につき | 32,450 | 川崎技術支援部 |
| K1627 | TEM試料調製 FIB-マイクロプロービング法 アルゴンイオンミリング | アルゴンイオンミリング仕上げ 1試料につき | 137,500 | 川崎技術支援部 |
| K1666 | TEM試料調製 FIB-マイクロプロービング法 アルゴンイオンミリング 試料作製のみ | アルゴンイオンミリング仕上げ 1試料につき(試料作製のみ) | 149,380 | 川崎技術支援部 |
| K1628 | TEM試料調製 FIB-マイクロプロービング法 アルゴンイオンミリング条件追加 | アルゴンイオンミリング仕上げ 1条件追加につき | 32,450 | 川崎技術支援部 |

集束イオンビーム装置(FIB)

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-------------------------------------|---------------------------|---------|---------|
| K1640 | 集束イオンビーム装置(FIB) | 1時間以内 | 33,880 | 川崎技術支援部 |
| K1641 | 集束イオンビーム装置(FIB) 追加 | 追加1時間あたり | 28,820 | 川崎技術支援部 |
| K1650 | FIBオプション カーボン膜デポジション | 10分あたり | 2,420 | 川崎技術支援部 |
| K1670 | FIBオプション アルゴンイオンミリング | 30分あたり | 11,330 | 川崎技術支援部 |
| K1680 | FIB付属のSEM | 1試料1視野観察につき | 20,680 | 川崎技術支援部 |
| K1681 | FIB付属のSEM 視野追加 | 同一試料において1視野追加観察につき | 4,620 | 川崎技術支援部 |
| K1682 | FIB付属のSEM 条件追加 | 同一試料において1条件追加につき | 4,620 | 川崎技術支援部 |
| K1690 | FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 点分析 | 点分析1視野1箇所につき | 17,050 | 川崎技術支援部 |
| K1691 | FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 点分析追加 | 点分析同一視野内で1箇所追加につき | 5,830 | 川崎技術支援部 |
| K1694 | FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 線分析 | 線分析1視野1箇所につき | 22,880 | 川崎技術支援部 |
| K1695 | FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 線分析追加 | 線分析同一視野内で1箇所追加につき | 8,910 | 川崎技術支援部 |
| K1692 | FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 面分析 | 面分析1視野につき | 34,650 | 川崎技術支援部 |
| K1696 | FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 各種データ処理 | 各種データ処理1条件につき | 5,830 | 川崎技術支援部 |
| K1672 | FIB-SEMによる 三次元再構築用連続断面画像の取得 | 1測定につき | 113,740 | 川崎技術支援部 |
| K1674 | FIB-SEMによる 三次元再構築用連続断面画像の取得 条件追加 | 1条件追加につき | 12,100 | 川崎技術支援部 |
| K1730 | FIB-SEMによる 微小試験片の作製 標準 | 標準的な作製 (SEM観察含む) 5本につき | 182,160 | 川崎技術支援部 |
| K1732 | FIB-SEMによる 微小試験片の作製 複雑 | 複雑な作製 (SEM観察含む) 5本につき | 273,130 | 川崎技術支援部 |
| K1735 | FIB-SEMによる 微小試験片の作製 条件追加 | 1条件追加につき | 11,550 | 川崎技術支援部 |
| K1610 | マニピュレーターによるサンプリング | 1試料につき | 5,830 | 川崎技術支援部 |
| K1630 | レーザーマーキング | 15分以内 | 2,860 | 川崎技術支援部 |
| K1635 | レーザーマーキング 追加 | 追加15分あたり | 1,870 | 川崎技術支援部 |

マルチ解析用集束イオンビーム装置(FIB)

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--|----------------------|---------|---------|
| K1940 | マルチ解析用集束イオンビーム装置(FIB) | 1時間以内 | 35,530 | 川崎技術支援部 |
| K1941 | マルチ解析用集束イオンビーム装置(FIB) 追加 | 追加1時間あたり | 30,470 | 川崎技術支援部 |
| K1950 | マルチ解析用FIBオプション カーボン膜デポジション | 10分あたり | 2,420 | 川崎技術支援部 |
| K1951 | マルチ解析用FIBオプション プラチナ膜デポジション | 10分あたり | 2,310 | 川崎技術支援部 |
| K1960 | マルチ解析用FIB付属のSEM | 1試料1視野観察につき | 20,900 | 川崎技術支援部 |
| K1961 | マルチ解析用FIB付属のSEM 視野追加 | 同一試料において1視野追加観察につき | 4,730 | 川崎技術支援部 |
| K1962 | マルチ解析用FIB付属のSEM 条件追加 | 同一試料において1条件追加につき | 4,730 | 川崎技術支援部 |
| K1965 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション 低真空 | 低真空モードの使用 | 11,660 | 川崎技術支援部 |
| K1970 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 点分析 | 点分析1視野1箇所につき | 17,380 | 川崎技術支援部 |
| K1971 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 点分析追加 | 点分析同一視野内で1箇所追加につき | 5,940 | 川崎技術支援部 |
| K1974 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 線分析 | 線分析1視野1箇所につき | 23,210 | 川崎技術支援部 |
| K1975 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 線分析追加 | 線分析同一視野内で1箇所追加につき | 8,910 | 川崎技術支援部 |
| K1976 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 面分析 | 面分析1視野につき | 34,760 | 川崎技術支援部 |
| K1978 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 各種データ処理 | 各種データ処理1条件につき | 5,940 | 川崎技術支援部 |
| K1980 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定 結晶方位マップ | 結晶方位マップ1視野につき | 48,840 | 川崎技術支援部 |
| K1981 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定 視野追加 | 同一試料で1視野追加につき | 11,660 | 川崎技術支援部 |
| K1984 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定 条件追加 | 1条件追加につき | 11,220 | 川崎技術支援部 |
| K1985 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定 各種データ処理 | 各種データ処理1条件につき | 5,940 | 川崎技術支援部 |
| K1990 | マルチ解析用FIB-SEMIによる三次元再構築用連続断面 画像の取得 | 1測定につき | 120,230 | 川崎技術支援部 |
| K1995 | マルチ解析用FIB-SEMIによる三次元再構築用連続断面 画像の取得 条件追加 | 1条件追加につき | 12,210 | 川崎技術支援部 |
| K1930 | マルチ解析用FIB-SEMIによる微小試験片の作製 標準 | 標準的な作製(SEM観察含む)5本につき | 193,710 | 川崎技術支援部 |
| K1932 | マルチ解析用FIB-SEMIによる微小試験片の作製 複雑 | 複雑な作製(SEM観察含む)5本につき | 292,820 | 川崎技術支援部 |
| K1935 | マルチ解析用FIB-SEMIによる微小試験片の作製 条件 追加 | 1条件追加につき | 11,880 | 川崎技術支援部 |

画像解析システム

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-------------------|----------|--------|---------|
| K1832 | 画像解析システム 三次元再構築 | 1測定対象につき | 62,590 | 川崎技術支援部 |
| K1834 | 画像解析システム 三次元データ処理 | 1条件追加につき | 12,430 | 川崎技術支援部 |
| K1840 | 画像解析システム 画像解析 | 1測定対象につき | 23,760 | 川崎技術支援部 |
| K1842 | 画像解析システム データ処理 | 1条件追加につき | 6,270 | 川崎技術支援部 |

(3) 光機能分野

① 光触媒評価

光触媒JIS試験

単位:円

| No. | 項目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------------------------------|------------|--------|---------|
| K3010 | 光触媒の窒素酸化物除去性能試験 | 1試験につき | 71,170 | 川崎技術支援部 |
| K3015 | 光触媒の窒素酸化物除去性能試験 －再生率－ | 1試験につき | 20,020 | 川崎技術支援部 |
| K3050 | 光触媒のアセトアルデヒド除去性能試験 | 1試験につき | 48,840 | 川崎技術支援部 |
| K3055 | 光触媒のアセトアルデヒド除去性能試験 －バッグ法 | 1試験につき | 44,990 | 川崎技術支援部 |
| K3060 | 光触媒のトルエン除去性能試験 | 1試験につき | 44,880 | 川崎技術支援部 |
| K3070 | 光触媒のホルムアルデヒド除去性能試験 | 1試験につき | 66,110 | 川崎技術支援部 |
| K3075 | 光触媒のメチルメルカプタン除去性能試験 | 1試験につき | 71,610 | 川崎技術支援部 |
| K3020 | 光触媒のセルフクリーニング試験 湿式分解性能の測定 | 1試験につき | 48,620 | 川崎技術支援部 |
| K3030 | 光触媒のセルフクリーニング試験 水接触角の測定 | 1試験につき | 71,610 | 川崎技術支援部 |
| K3080 | 光触媒の水浄化性能試験(JISR1704準拠) (明条件のみ) | 1試験につき | 81,840 | 川崎技術支援部 |
| K3085 | 光触媒の水浄化性能試験(JISR1704準拠) (暗条件のみ) | 1試験につき | 81,840 | 川崎技術支援部 |
| K3105 | 光触媒性能試験JIS試験条件不成立時 (試験途中中止時) | 1試験につき | 24,310 | 川崎技術支援部 |
| K3110 | 光触媒試料調製 | 処理時間30分につき | 3,740 | 川崎技術支援部 |

光触媒性能応用評価試験

単位:円

| No. | 項目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|------------|--------|---------|
| K3122 | その他光触媒性能試験 | 1時間につき | 7,150 | 川崎技術支援部 |
| K3090 | 空気清浄機によるたばこ煙成分の脱臭試験 (JEM1467に準じた試験法) | 1試験につき | 69,740 | 川崎技術支援部 |
| K3042 | 水接触角の測定(光触媒JIS試験以外) | 1試料1点につき | 4,950 | 川崎技術支援部 |
| K3047 | 水接触角の測定(光触媒JIS試験以外)追加 | 1点追加につき | 1,210 | 川崎技術支援部 |
| K3110 | 光触媒試料調製 | 処理時間30分につき | 3,740 | 川崎技術支援部 |

② 太陽電池評価

単位:円

| No. | 項目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-----------------------|----------------|--------|---------|
| K3310 | 太陽電池のIPCE測定 | 1試料につき | 41,360 | 川崎技術支援部 |
| K3312 | 太陽電池のIPCE測定 追加 | 1試料または1条件追加につき | 11,660 | 川崎技術支援部 |
| K3320 | 太陽電池のI-V測定 | 1試料につき | 42,570 | 川崎技術支援部 |
| K3322 | 太陽電池のI-V測定 追加 | 1試料または1条件追加につき | 11,880 | 川崎技術支援部 |
| K3330 | 太陽電池のI-V測定 LED特定波長 | 1試料につき | 23,100 | 川崎技術支援部 |
| K3332 | 太陽電池のI-V測定 LED特定波長 追加 | 1試料または1条件追加につき | 7,150 | 川崎技術支援部 |
| K3620 | 低照度環境下におけるI-V測定 | 1条件につき | 5,500 | 川崎技術支援部 |
| K3622 | 低照度環境下におけるI-V測定 追加 | 1試料または1条件追加につき | 2,640 | 川崎技術支援部 |
| K3350 | XeランプSSによる連続照射 | 24時間につき | 22,770 | 川崎技術支援部 |
| K3352 | XeランプSSによる連続照射 追加 | 追加24時間につき | 20,240 | 川崎技術支援部 |
| K3360 | LED-SSによる特定波長の光照射 | 24時間につき | 33,000 | 川崎技術支援部 |
| K3362 | LED-SSによる特定波長の光照射 追加 | 追加24時間につき | 30,360 | 川崎技術支援部 |

(太陽電池評価)

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|----------------------|--------------------------------------|--------|---------|
| K3610 | 2灯式SSによる連続照射 | 24時間につき(150mm角まで 山下電装YSS-T150Aを使用) | 54,670 | 川崎技術支援部 |
| K3612 | 2灯式SSによる連続照射 追加 | 追加24時間につき(150mm角まで 山下電装YSS-T150Aを使用) | 52,800 | 川崎技術支援部 |
| K3630 | 低照度光源による光照射 | 1時間につき | 4,180 | 川崎技術支援部 |
| K3632 | 低照度光源による光照射 24時間 | 24時間につき | 30,140 | 川崎技術支援部 |
| K3640 | 無抵抗電流計による電流値測定 | 1時間につき | 1,210 | 川崎技術支援部 |
| K3642 | 無抵抗電流計による電流値測定 24時間 | 24時間につき | 9,130 | 川崎技術支援部 |
| K3650 | データロガーによる測定 | 1時間につき | 1,210 | 川崎技術支援部 |
| K3652 | データロガーによる測定 24時間 | 24時間につき | 9,240 | 川崎技術支援部 |
| K3655 | オシロスコープ | 1時間につき | 2,090 | 川崎技術支援部 |
| K3657 | オシロスコープ 24時間 | 24時間につき | 10,450 | 川崎技術支援部 |
| K3390 | 連続光照射に伴う簡易なI-V測定 | 1回につき | 3,520 | 川崎技術支援部 |
| K3395 | 太陽電池のインピーダンス測定 | 1試料につき | 14,410 | 川崎技術支援部 |
| K3420 | 発電面積規定用遮光マスク(面積測定済み) | 1枚につき | 1,870 | 川崎技術支援部 |

③ 光学特性評価

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---------------------------|-----------|--------|---------|
| K3450 | 紫外・可視分光光度計による透過率・反射率測定 | 1試料1条件につき | 6,820 | 川崎技術支援部 |
| K3452 | 紫外・可視分光光度計による透過率・反射率測定 追加 | 追加1条件につき | 3,740 | 川崎技術支援部 |
| K3470 | 分光放射照度計によるスペクトル測定 | 1測定につき | 10,450 | 川崎技術支援部 |
| K3670 | 色彩輝度計による輝度・色度・相関色温度の測定 | 1測定につき | 4,730 | 川崎技術支援部 |
| K3672 | 色彩輝度計による輝度・色度・相関色温度の測定 追加 | 1測定追加につき | 3,080 | 川崎技術支援部 |
| K3680 | 色差計による色差の測定 | 1測定につき | 3,410 | 川崎技術支援部 |
| K3690 | 赤外線サーモグラフィによる温度測定 | 1測定につき | 2,750 | 川崎技術支援部 |
| K3660 | 光学測定に関わる作業 | 1時間につき | 7,260 | 川崎技術支援部 |

④ 光劣化促進試験

単位:円

| No. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|--------------|--------|---------|
| K3431 | 紫外線照射試験機(東洋精機製作所 Atlas UV test) | 24時間につき | 6,270 | 川崎技術支援部 |
| K3434 | 紫外線照射試験機(東洋精機製作所 Atlas UV test) 連続100時間 | 連続運転100時間につき | 23,210 | 川崎技術支援部 |
| K3436 | 紫外線照射試験機 UV-B, C(東洋精機製作所 Atlas UV test) | 24時間につき | 7,150 | 川崎技術支援部 |
| K3437 | 紫外線照射試験機 UV-B, C(東洋精機製作所 Atlas UV test) 連続100時間 | 連続運転100時間につき | 24,970 | 川崎技術支援部 |
| K3440 | 小型Xe耐光試験機(東洋精機製作所 Atlas SUNTEST XLS+) | 24時間につき | 7,700 | 川崎技術支援部 |
| K3442 | 小型Xe耐光試験機(東洋精機製作所 Atlas SUNTEST XLS+) 連続100時間 | 連続運転100時間につき | 26,950 | 川崎技術支援部 |

(4) 試料前処理 (前項までの試験の各項目に適用)

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
|-------|------------------------------------|----------------|--------|---------|
| K4120 | 試料前処理(切断、導電処理等) | 処理時間30分につき | 1,650 | 川崎技術支援部 |
| K4210 | 精密機械研磨法 A: 容易な試料 | 1試料につき | 12,320 | 川崎技術支援部 |
| K4212 | 精密機械研磨法 B: 標準的な試料 | 1試料につき | 24,750 | 川崎技術支援部 |
| K4214 | 精密機械研磨法 C: 複雑な試料 | 1試料につき | 36,520 | 川崎技術支援部 |
| K4216 | 精密機械研磨法 D: 非常に複雑な試料 | 1試料につき | 48,400 | 川崎技術支援部 |
| K4217 | 精密機械研磨法 条件追加 | 1条件追加につき | 5,720 | 川崎技術支援部 |
| K4220 | 試料の撮影 | 1試料1視野につき | 2,310 | 川崎技術支援部 |
| K4230 | 断面イオンミリング法 (小さい試料用) A: 容易な試料 | 1試料につき | 24,090 | 川崎技術支援部 |
| K4232 | 断面イオンミリング法 (小さい試料用) B: 標準的な試料 | 1試料につき | 47,300 | 川崎技術支援部 |
| K4234 | 断面イオンミリング法 (小さい試料用) C: 複雑な試料 | 1試料につき | 72,490 | 川崎技術支援部 |
| K4236 | 断面イオンミリング法 (小さい試料用) D: 非常に複雑な試料 | 1試料につき | 92,620 | 川崎技術支援部 |
| K4237 | 断面イオンミリング法 (小さい試料用) 条件追加 | 1条件追加につき | 5,830 | 川崎技術支援部 |
| K4238 | 断面イオンミリング法 (小さい試料用) クライオ | クライオの使用 1試料につき | 5,830 | 川崎技術支援部 |
| K4240 | 平面イオンミリング法 (小さい試料用) A: 容易な試料 | 1試料につき | 11,440 | 川崎技術支援部 |
| K4242 | 平面イオンミリング法 (小さい試料用) B: 標準的な試料 | 1試料につき | 23,870 | 川崎技術支援部 |
| K4244 | 平面イオンミリング法 (小さい試料用) C: 複雑な試料 | 1試料につき | 34,320 | 川崎技術支援部 |
| K4246 | 平面イオンミリング法 (小さい試料用) D: 非常に複雑な試料 | 1試料につき | 44,770 | 川崎技術支援部 |
| K4247 | 平面イオンミリング法 (小さい試料用) 条件追加 | 1条件追加につき | 5,830 | 川崎技術支援部 |
| K4248 | 平面イオンミリング法 (小さい試料用) クライオ | クライオの使用 1試料につき | 5,830 | 川崎技術支援部 |
| K4250 | 断面イオンミリング法 (大きい試料用) A: 容易な試料 | 1試料につき | 23,100 | 川崎技術支援部 |
| K4252 | 断面イオンミリング法 (大きい試料用) B: 標準的な試料 | 1試料につき | 45,980 | 川崎技術支援部 |
| K4254 | 断面イオンミリング法 (大きい試料用) C: 複雑な試料 | 1試料につき | 68,860 | 川崎技術支援部 |
| K4256 | 断面イオンミリング法 (大きい試料用) D: 非常に複雑な試料 | 1試料につき | 91,960 | 川崎技術支援部 |
| K4257 | 断面イオンミリング法 (大きい試料用) 条件追加 | 1条件追加につき | 5,720 | 川崎技術支援部 |
| K4258 | 断面イオンミリング法 (大きい試料用) クライオ | クライオの使用 1試料につき | 5,830 | 川崎技術支援部 |
| K4260 | 平面イオンミリング法 (大きい試料用) A: 容易な試料 | 1試料につき | 11,220 | 川崎技術支援部 |
| K4262 | 平面イオンミリング法 (大きい試料用) B: 標準的な試料 | 1試料につき | 21,340 | 川崎技術支援部 |
| K4264 | 平面イオンミリング法 (大きい試料用) C: 複雑な試料 | 1試料につき | 31,350 | 川崎技術支援部 |
| K4266 | 平面イオンミリング法 (大きい試料用) D: 非常に複雑な試料 | 1試料につき | 41,800 | 川崎技術支援部 |
| K4267 | 平面イオンミリング法 (大きい試料用) 条件追加 | 1条件追加につき | 5,390 | 川崎技術支援部 |

(試料前処理 (前項までの試験の各項目に適用))

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------------------|----------------|--------|---------|
| K4270 | イオンビームスパッタ | 1試料につき | 5,940 | 川崎技術支援部 |
| K4280 | ウルトラマイクローム法 A:容易な試料 | 1試料につき | 24,420 | 川崎技術支援部 |
| K4282 | ウルトラマイクローム法 B:標準的な試料 | 1試料につき | 49,170 | 川崎技術支援部 |
| K4284 | ウルトラマイクローム法 C:複雑な試料 | 1試料につき | 74,030 | 川崎技術支援部 |
| K4286 | ウルトラマイクローム法 D:非常に複雑な試料 | 1試料につき | 98,670 | 川崎技術支援部 |
| K4287 | ウルトラマイクローム法 条件追加 | 1条件追加につき | 6,270 | 川崎技術支援部 |
| K4288 | ウルトラマイクローム法 クライオ | クライオの使用 1試料につき | 60,720 | 川崎技術支援部 |
| K4310 | カーボンコーティング | 1試料につき | 3,520 | 川崎技術支援部 |
| K4320 | 金コーティング | 1試料につき | 3,520 | 川崎技術支援部 |
| K4330 | 白金コーティング | 1試料につき | 3,520 | 川崎技術支援部 |
| K4340 | パラジウムコーティング | 1試料につき | 3,520 | 川崎技術支援部 |
| K4350 | オスmiumコーティング | 1試料につき | 3,520 | 川崎技術支援部 |
| K4170 | 分散法 ふりかけ法 | 1試料につき | 6,600 | 川崎技術支援部 |
| K4171 | 分散法 懸濁法 | 1試料につき | 13,090 | 川崎技術支援部 |
| K4180 | 低エネルギーイオンミリング(ジェントルミル) | 1試料1条件につき | 14,850 | 川崎技術支援部 |
| K4185 | 樹脂包埋 | 1試料につき | 14,190 | 川崎技術支援部 |
| K4192 | 電子染色 | 1試料につき | 29,260 | 川崎技術支援部 |
| K4195 | その他特殊処理 | 1試料につき | 17,710 | 川崎技術支援部 |
| K4196 | その他特殊処理 条件追加 | 1条件追加につき | 17,710 | 川崎技術支援部 |

(5) 成績書の複本の交付

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|----------------|-----------------------------|-----|------------------|
| K9030 | 成績書の複本・データ等の交付 | 1通につき(写真を含む場合は別に加算することができる) | 297 | 川崎技術支援部 E5350 |

(6) 技術開発受託報告書の作成

単位:円

| No. | 項 目 | 単 位 | 料金 | 担当部名 |
|-------|----------------------|-----------------------------|-------|---------|
| K9050 | 技術開発受託報告書の作成(データ処理) | 基本単位 (難易度により加算あり) | 2,970 | 川崎技術支援部 |
| K9060 | 技術開発受託報告書の作成(考察) | 基本単位 (難易度により加算あり) | 6,050 | 川崎技術支援部 |
| K9070 | 技術開発受託報告書の複本・データ等の交付 | 1通につき(写真を含む場合は別に加算することができる) | 297 | 川崎技術支援部 |

2 機器使用料金

(1) 生産・加工機器

① 微細加工機器

単位:円

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--|-----------------------------|--------|---------|
| K2425 | 低エネルギーイオン研磨装置 Model IV5(ジェントルミル) (1時間あたり) | リンダ社 Model IV5 (ジェントルミル) | 12,100 | 川崎技術支援部 |

(2) 環境試験・電磁環境試験機器

① 温湿度環境試験

単位:円

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|-------------------|-------|---------|
| K6430 | 恒温槽(室温~300℃) PVH-110M (1時間あたり) | エスペック PVH-110M | 660 | 川崎技術支援部 |
| K6420 | 恒温恒湿槽(小)(-40~150℃) ETAC TH411HA (1時間あたり) | 楠本化成 ETAC TH411HA | 770 | 川崎技術支援部 |
| K6410 | 恒温恒湿槽(中)(-40~150℃) ETAC FX424P (1時間あたり) | 楠本化成 ETAC FX424P | 1,210 | 川崎技術支援部 |
| K6460 | 恒温恒湿槽(-40~100℃) PL-3FPW (1時間あたり) | エスペック PL-3FPW | 990 | 川崎技術支援部 |
| K6440 | プレッシャークッカー ETAC PM420 (1時間あたり) | 楠本化成 ETAC PM420 | 990 | 川崎技術支援部 |
| K6450 | 冷熱衝撃試験機(小) ETAC TS100 (1時間あたり) | 楠本化成 ETAC TS100 | 1,430 | 川崎技術支援部 |
| K2815 | 冷熱衝撃試験機(小) ETAC NT1050W (1時間あたり) | 楠本化成 ETAC NT1050W | 1,430 | 川崎技術支援部 |
| K2820 | 超低温恒温恒湿槽(-70~150℃) PSL-2KPH (1時間あたり) | エスペック PSL-2KPH | 1,100 | 川崎技術支援部 |

② 電磁環境試験機器

単位:円

| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|----------------------------|-------|---------|
| K2310 | 電波暗室(測定帯域 30MHz~1GHz) TDK製(3m法) (1時間以内) | TDK製(3m法) | 8,140 | 川崎技術支援部 |
| K2311 | 電波暗室(測定帯域 30MHz~1GHz) TDK製(3m法) (追加30分あたり) | TDK製(3m法) | 3,960 | 川崎技術支援部 |
| K2315 | 電波暗室(測定帯域 1GHz~6GHz) TDK製(3m法) (1時間以内) | TDK製(3m法) | 9,460 | 川崎技術支援部 |
| K2316 | 電波暗室(測定帯域 1GHz~6GHz) TDK製(3m法) (追加30分あたり) | TDK製(3m法) | 4,510 | 川崎技術支援部 |
| K2430 | シールドルーム SH-H1313 (1時間以内) | ノイズ研究所製 SH-H1313 | 3,300 | 川崎技術支援部 |
| K2431 | シールドルーム SH-H1313 (追加30分あたり) | ノイズ研究所製 SH-H1313 | 1,210 | 川崎技術支援部 |
| K2440 | シールドテント TM-2.5-1.7-2-2 (1時間以内) | 富山電気ビルディング製 TM-2.5-1.7-2-2 | 3,190 | 川崎技術支援部 |
| K2441 | シールドテント TM-2.5-1.7-2-2 (追加30分あたり) | 富山電気ビルディング製 TM-2.5-1.7-2-2 | 1,430 | 川崎技術支援部 |
| K2450 | EMI測定システムA(放射雑音測定) N9010A EXA (1時間以内) | キーサイト N9010A | 5,610 | 川崎技術支援部 |
| K2451 | EMI測定システムA(放射雑音測定) N9010A EXA (追加30分あたり) | キーサイト N9010A | 1,650 | 川崎技術支援部 |
| K2460 | EMI測定システムA(伝導性雑音測定) N9010A EXA (1時間以内) | キーサイト N9010A | 4,070 | 川崎技術支援部 |
| K2461 | EMI測定システムA(伝導性雑音測定) N9010A EXA (追加30分あたり) | キーサイト N9010A | 1,210 | 川崎技術支援部 |

(電磁環境試験機器)

| No. | 設 備 機 器 名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|--|-------------------------|-------|---------|
| K2350 | インピーダンス安定化回路網(ISN) ISN T8、ISN T8CAT6 (1時間以内) | TESEQ社 ISN T8,T8CAT6 | 1,320 | 川崎技術支援部 |
| K2351 | インピーダンス安定化回路網(ISN) ISN T8、ISN T8CAT6 (追加30分あたり) | TESEQ社 ISN T8,T8CAT6 | 770 | 川崎技術支援部 |
| K2330 | 電源高調波電流測定器 PM3000ACE他 (1時間以内) | Voltec PM3000ACE他 | 2,860 | 川崎技術支援部 |
| K2331 | 電源高調波電流測定器 PM3000ACE他 (追加30分あたり) | Voltec PM3000ACE他 | 1,430 | 川崎技術支援部 |
| K2380 | パルスイミュニティ試験器 Compact NX5 (1時間以内) | EM Test NX5 | 2,970 | 川崎技術支援部 |
| K2381 | パルスイミュニティ試験器 Compact NX5 (追加30分あたり) | EM Test NX5 | 1,320 | 川崎技術支援部 |
| K2360 | 静電気試験器 ESS-S3011>-30R (1時間以内) | ノイズ研究所 ESS-S3011>-30R | 2,420 | 川崎技術支援部 |
| K2361 | 静電気試験器 ESS-S3011>-30R (追加30分あたり) | ノイズ研究所 ESS-S3011>-30R | 1,210 | 川崎技術支援部 |
| K2776 | 伝導イミュニティ試験器 NSG2070 (1時間以内) | SCHAFFNER NSG2070 | 2,860 | 川崎技術支援部 |
| K2777 | 伝導イミュニティ試験器 NSG2070 (追加30分あたり) | SCHAFFNER NSG2070 | 1,430 | 川崎技術支援部 |
| K2370 | ノイズシミュレータ INS-4040 (1時間以内) | ノイズ研究所 INS-4040 | 2,860 | 川崎技術支援部 |
| K2371 | ノイズシミュレータ INS-4040 (追加30分あたり) | ノイズ研究所 INS-4040 | 1,430 | 川崎技術支援部 |

(3) 試験・計測機器

① 形状測定

単位:円

| No. | 設 備 機 器 名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|----------------------------------|----------------|-------|---------|
| K6370 | 表面粗さ形状測定機 サーフコム 550A (1時間あたり) | 東京精密 サーフコム550A | 1,430 | 川崎技術支援部 |

② 物理特性試験機

単位:円

| No. | 設 備 機 器 名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-----------------------|--------------------|-------|---------|
| K3560 | 赤外線サーモグラフィ (1時間あたり) | 日本アビオニクス TVS-200EX | 2,750 | 川崎技術支援部 |
| K3542 | 接触角計 DMs-401 (1時間あたり) | 協和界面科学 DMs-401 | 3,410 | 川崎技術支援部 |

③ 電気計測機器

単位:円

| No. | 設 備 機 器 名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------------------------------|---------------------|-------|---------|
| K6510 | オシロスコープ WaveRunner62Xi (1時間あたり) | レクロイ WaveRunner62Xi | 2,310 | 川崎技術支援部 |
| K6515 | ACミリオームハイテスター 3560 (1時間あたり) | 日置電機 3560 | 550 | 川崎技術支援部 |
| K6517 | 超絶縁計 SM-8220 (1時間あたり) | 日置電機 SM-8220 | 220 | 川崎技術支援部 |
| K6518 | 交流耐電圧試験器 3158 (1時間あたり) | 日置電機 3158 | 220 | 川崎技術支援部 |
| K6520 | 漏れ電流試験器 (1時間あたり) | 日置電機 ST5540 | 990 | 川崎技術支援部 |

(4) 分析・評価機器(観察)

① マイクロスコープ

単位:円

| No. | 設 備 機 器 名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|----------------------------------|---------------|-------|---------|
| K2915 | デジタルマイクロスコープ VHX-600 (30分あたり) | キーエンス VHX-600 | 1,650 | 川崎技術支援部 |

② 光学顕微鏡

単位:円

| No. | 設 備 機 器 名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|----------------------|-----------------|-------|---------|
| K6110 | 金属顕微鏡 BX-51 (1時間あたり) | オリンパス光学工業 BX-51 | 1,650 | 川崎技術支援部 |

③ 電子顕微鏡

単位:円

| No. | 設 備 機 器 名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|----------------------------|--------------------|--------|---------|
| K2015 | FE-SEM/EDS S-4800 (1時間あたり) | 日立ハイテクノロジーズ S-4800 | 39,380 | 川崎技術支援部 |
| K2635 | レーザーマーカ LR2100ST(30分あたり) | HOYA LR2100ST | 3,080 | 川崎技術支援部 |

④ 内部観察機器

単位:円

| No. | 設 備 機 器 名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|----------------------|-------|---------|
| K2720 | マイクロフォーカスX線検査装置 MXT-160UU (30分以内) | メディエックステック MXT-160UU | 4,070 | 川崎技術支援部 |
| K2725 | マイクロフォーカスX線検査装置 MXT-160UU (追加15分あたり) | メディエックステック MXT-160UU | 1,650 | 川崎技術支援部 |

(5) 分析・評価機器(組成分析)

① 元素分析

単位:円

| No. | 設 備 機 器 名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|-------------------------|-------|---------|
| K2210 | 微小部蛍光X線分析装置(XRF) SEA6000VX HSFinder (1時間あたり) | SII社 SEA6000VX HSFinder | 6,050 | 川崎技術支援部 |

② 組成分析

単位:円

| No. | 設 備 機 器 名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|---|----------------------------|-------|---------|
| K6050 | フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR) FT/IR-6300FV・IRT-7000(1時間あたり) | 日本分光 FT/IR-6300FV・IRT-7000 | 9,680 | 川崎技術支援部 |

(6) 分析・評価機器(物性[光、熱、音振、エネルギー])

① 光学機器・分光分析

単位:円

| No. | 設 備 機 器 名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|-----------------------------|----------------------|-------|---------|
| K3550 | 紫外・可視分光光度計 UH4150(1時間以内) | 日立ハイテックスサイエンス UH4150 | 8,470 | 川崎技術支援部 |
| K3552 | 紫外・可視分光光度計 UH4150(追加30分あたり) | 日立ハイテックスサイエンス UH4150 | 2,860 | 川崎技術支援部 |

(7) 機器操作指導料

単位:円

| No. | 設 備 機 器 名 | メーカー・型式 | 料金 | 担当部名 |
|-------|------------------------------|--------------|-------|---------|
| K7030 | 機器操作指導料 (開放利用時に適用) 15分あたり | 立会人1人、15分あたり | 3,080 | 川崎技術支援部 |